PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-055222

(43)Date of publication of application: 20.02.2002

1)Int.CI.

G02B 5/20 B41J 2/01

G02F 1/1335 G03F 7/40

1)Application number: 2000-243590

: 2000-243590 11.08.2000 (71)Applicant : CANON INC

2)Date of filing:

(72)Inventor: SHIBA SHOJI

TAKANO KATSUHIKO

OKADA TAKESHI YANAI HIROSHI NISHIDA TAKETO SAKAMOTO JUNICHI

IWATA KENITSU

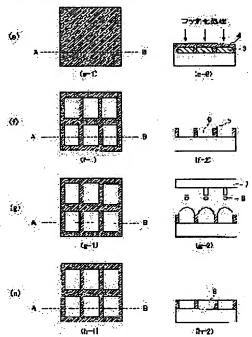
OKADA YOSHIKATSU

4) OPTICAL DEVICE, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME AND LIQUID CRYSTAL DEVICE

7)Abstract:

ROBLEM TO BE SOLVED: To prevent color mixing and void in the sthod for manufacturing an optical device by an ink jet method.

DLUTION: A positive resist pattern 3 is formed on a supporting substrate and a resin composition layer 4 is formed thereon and fluorinated to crease the ink-repelling property of the surface of the resin composition /er 4. Then the resin composition layer 4 on the resist pattern 3 is moved together with the resist pattern 3 by a lift-off method to form rrier walls 5. Ink 8 is supplied to the openings 6 to form pixels 9.



GAL STATUS

ate of request for examination]

ate of sending the examiner's decision of rejection]

ind of final disposal of application other than the

aminer's decision of rejection or application converted

gistration]

ate of final disposal for application]

atent number]

pan Patent Office is not responsible for any mages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

**** shows the word which can not be translated.

in the drawings, any words are not translated.

AIMS

laim(s)]

laim 1] The process which forms a positive type resist pattern in the field which is the manufacture approach of an tical element of having the septum which consists of a resin constituent located on a support substrate between two or pre pixels and the adjoining pixel at least, and is surrounded by the septum on a support substrate, The process which vers the above-mentioned resist pattern and forms a resin constituent layer all over a support substrate, The process nich performs fluorination processing to the above-mentioned resin constituent layer front face, and the process which noves the resin constituent layer on the above-mentioned resist pattern this whole resist pattern, and forms a septum, we manufacture approach of the optical element characterized by having the process which gives ink to the field rrounded by the ink jet method by the above-mentioned septum, and forms a pixel in it.

laim 2] The manufacture approach of the optical element according to claim 1 which is the plasma treatment which above-mentioned fluorination processing introduces the gas which contains a fluorine atom at least, and performs a 1 sma exposure.

laim 3] The manufacture approach of the optical element according to claim 1 or 2 which forms the above-mentioned ptum with the resin constituent containing a protection-from-light agent.

laim 4] The manufacture approach of an optical element according to claim 3 that the above-mentioned protection-m-light agent is carbon black.

laim 5] The manufacture approach of an optical element according to claim 1 to 4 of performing parent ink-ized ocessing on a support substrate front face before the above-mentioned positive type resist pattern formation process. laim 6] The manufacture approach of an optical element according to claim 5 that the above-mentioned parent ink-id processing is the washing processing by the alkali water solution, UV washing processing, excimer washing ocessing, corona discharge treatment, or oxygen plasma treatment.

laim 7] The manufacture approach of an optical element according to claim 1 to 6 that the above-mentioned ink ntains a hardening component, water, and an organic solvent at least.

laim 8] The manufacture approach of an optical element according to claim 1 to 7 of the above-mentioned ink ntaining a coloring agent and manufacturing the color filter whose pixel is the coloring section.

laim 9] The manufacture approach of an optical element according to claim 1 to 7 of manufacturing the extroluminescent element whose above-mentioned pixel is a luminous layer.

laim 10] The optical element characterized by having the septum located on a support substrate between two or more tels and the adjoining pixel at least, and being manufactured by the manufacture approach of an optical element cording to claim 1 to 7.

laim 11] The optical element according to claim 10 whose above-mentioned septum is a protection-from-light layer.

laim 12] The optical element according to claim 10 or 11 which the above-mentioned support substrate is a nsparence substrate, is the coloring section formed in the ink in which the above-mentioned pixel contains a coloring ent, and is the color filter equipped with the coloring section of two or more colors.

laim 13] The optical element according to claim 12 which has a protective layer on the above-mentioned coloring tion.

laim 14] The optical element according to claim 12 or 13 which has the transparence electric conduction film on a nt face.

laim 15] The optical element according to claim 10 or 11 which the above-mentioned pixel is a luminous layer and is electroluminescent element which has an electrode up and down on both sides of this luminous layer.

laim 16] The liquid crystal device characterized by having come to pinch liquid crystal and constituting one substrate ng an optical element according to claim 12 to 14 between the substrates of a pair.

ranslation done.]

NOTICES *

pan Patent Office is not responsible for any mages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

**** shows the word which can not be translated.

n the drawings, any words are not translated.

ETAILED DESCRIPTION

etailed Description of the Invention

001]

eld of the Invention] This invention relates to the liquid crystal device which comes further to use the color filter ich is one of the optical element manufactured by this manufacture approach, and these the optical elements about the inufacture approach of manufacturing an optical element called the electroluminescent element of the color filter ich is the configuration member of the electrochromatic display component currently used for color television, the rsonal computer, the pachinko game base, etc., and the full color display equipped with two or more luminous layers ing an ink jet method.

)02]

escription of the Prior Art] In recent years, it is in a liquid crystal display, especially the inclination which the need of olor liquid crystal display increases with development of a personal computer, especially development of a portable rsonal computer. However, for the further spread, a cost cut is required, and the demand to the cost cut of a color filter th specific gravity heavy in cost is increasing especially.

)03] Although various approaches are tried in order to meet the above-mentioned demand from the former, satisfying demand characteristics of a color filter, the method of still satisfying all demand characteristics is not established.

ch approach is explained below.

)04] A primary method is a staining technique. After a staining technique forms first the water-soluble polymericiterials layer which is an ingredient for dyeing on a transparence substrate and carries out patterning of this to a sired configuration according to a photolithography process, it obtains the pattern which was immersed in the dyeing th in the obtained pattern, and was colored. By repeating this process 3 times, the coloring layer which consists of the loring section of three colors of R (red), G (green), and B (blue) is formed.

105] The second approach is a pigment-content powder method, and is performed recent years most briskly. This proach obtains a monochromatic pattern by forming first the photopolymer layer which distributed the pigment on a nsparence substrate, and carrying out patterning of this. By repeating this process 3 times, the coloring layer which asists of the coloring section of three colors of R, G, and B is formed.

106] There is an electrodeposition process as the third approach. This approach is first immersed in the electropainting uid which carried out patterning of the transparent electrode on the transparence substrate, and entered [electrolytic ution / a pigment, resin,], and electrodeposits the first color. This process is repeated 3 times, the coloring layer ich consists of the coloring section of three colors of R, G, and B is formed, and it calcinates at the end.

107] As the fourth approach, a pigment is distributed to the resin of a heat-curing mold, and after distinguishing R, G, 1 B by different color with by repeating printing 3 times, a coloring layer is formed by carrying out heat curing of the

in. Also in which approach, it is common to form a protective layer on a coloring layer.

108] The point common to these approaches is repeating the same process 3 times, in order to color three colors of R, and B, and becoming cost quantity. Moreover, it also has the problem that the yield falls, so that there are many iting counters. Furthermore, in an electrodeposition process, since the pattern configuration which can be formed is nited, with the present technique, application is difficult for the configuration of the liquid crystal device of a TFT old (TFT, i.e., the active-matrix drive method using the thin film transistor as a switching element).

109] Moreover, since definition of print processes is bad, they are unsuitable for the pattern formation of a fine pitch.

110] The manufacture approach of a color filter of having used the ink jet method is briskly considered in recent years order to compensate the above faults. The approach using an ink jet method has the advantage that a manufacture icess is simple and low cost.

)11] On the other hand, an ink jet method is applicable not only to manufacture of a color filter but manufacture of an

ectroluminescent element.

312] An electroluminescent element is a component made to emit light using emission of the fluorescence at the time having the configuration whose thin film containing inorganic [of fluorescence] and an organic compound was a sched in cathode and an anode plate, making an exciton generate by making an electron and an electron hole (hole) ur in and recombine with the above-mentioned thin film, and this exciton deactivating. An ink jet method can give the corescence ingredient used for such an electroluminescent element on the substrate which made components, such as 'T, a luminous layer can be formed, and a component can be constituted.

213]

- roblem(s) to be Solved by the Invention] As described above, since an ink jet method can plan simplification and the st reduction of a manufacture process, it is applied to manufacture of optical elements, such as a color filter and an extroluminescent element. However, in manufacture of such an optical element, there is a problem called "color xture" and "white omission" as a problem peculiar to an ink jet method. Hereafter, the case where a color filter is unufactured is mentioned as an example, and is explained.
- 114] "Color mixture" is a failure generated when ink is mixed between the pixels (coloring section) of an adjoining ferent color. It is necessary to the volume of opening of a black matrix to give the ink which has one dozens times everal times to] the volume of this by using a black matrix as a septum in the manufacture approach of the color filter tich gives ink to opening of this black matrix and forms the coloring section. Since a black matrix can fully function a septum and can hold ink in opening of this black matrix when there is comparatively little volume of the ink with the solid content concentration contain in ink, such as a coloring agent and a hardening component, case [ink] mely, give, the gave ink overcomes a black matrix and does not reach even the coloring section of an adjoin ferent color. However, since ink overflows exceeding the black matrix used as a septum when the solid content ncentration in ink is low (i.e., when it is necessary to give a lot of ink), color mixture will occur between the adjoining loring sections. Since it is stabilized from the nozzle of an ink jet head, there is a limitation in the viscosity of the ink which the regurgitation is possible and there is a limitation also in the concentration of the solid content contained in a sepecially, the technique for avoiding color mixture is required.
- 115] Then, the method of preventing color mixture using the wettability difference of the ink between the coloring xion and a septum is proposed. For example, in JP,59-75205,A, although the approach of forming a diffusion evention pattern by the wettability bad matter is proposed in order to prevent that ink spreads out of the purpose field, concrete technique is not indicated. The approach of carrying out patterning of the big silicone rubber layer of water-sellent ** oil-repellent operation as concrete technique, and on the other hand, using as the bridge wall for color xture prevention in JP,4-123005,A, is proposed. Furthermore, in JP,5-241011,A or JP,5-241012,A, a silicone rubber er is formed on the black matrix used as a protection-from-light layer, and the technique used as a septum for color xture prevention is indicated similarly.
- 116] According to these approaches, when the ink of the amount far exceeding the height of a septum is given, in ler that the surface layer of a septum may show ** ink nature, ink can be crawled, even the coloring section which joins over a septum cannot be attained to, and color mixture can be prevented effectively.
- 117] The conceptual diagram is shown in <u>drawing 3</u>. The black matrix to which 31 served as the transparence ostrate among drawing, and 33 served as the septum, and 36 are ink. When the top face of the black matrix 33 has ** nature, as shown in <u>drawing 3</u> (b), the given ink 36 is held in opening of the black matrix 33, and does not reach en the adjoining coloring section. However, when the ** ink nature of the top face of the black matrix 33 is low, as own in <u>drawing 3</u> (a), the given ink 36 will be mixed with the ink which was damp even on the black matrix 33 and s given to breadth and adjoining opening.
-)18] Moreover, generally the ** ink nature in which the rather than direction which uses a fluorine compound was be excellent using the silicon compound can be obtained. For example, in JP,2000-35511,A, the resist pattern of a sitive type is formed on the protection-from-light section, the approach of applying a ** ink-ized processing agent on s pattern further is indicated, and using a fluorine compound is indicated as a ** ink-ized processing agent. However, the case of this approach, it is necessary to remove the positive type resist pattern prepared on the protection-from-ht section after coloring section formation but, and in case a resist pattern is removed, problems, such as the solution of a pixel, exfoliation, and swelling, may be produced.
- 119] Moreover, the method of plasma-izing the reactant gas of a fluorine compound to JP,6-65408,A, and processing o it as the technique of fluorinating the front face of a resin layer, is proposed. Furthermore, the approach of carrying plasma treatment by the gas containing a fluorine compound in JP,11-271753,A as an example which applied this hnique to the color filter as the technique of considering as the multilayer structure of the lower layer which has npatibility for a septum to ink, and the upper layer which has non-compatibility, and making the upper layer non-

mpatibility to ink is indicated.

- D20] However, since each technique mentioned above needs to multilayer a septum and needs to carry out multiplenes operation of the photolithography process, it has the problem of causing complication of a process, a cost rise, as a sult a yield fall.
- D21] On the other hand, a "white omission" causes enough in the field where the mainly given ink was surrounded by septum, and a poor display which it is the failure which originates in the ability not to be spread in homogeneity and nerated, and is called the fall of color nonuniformity or contrast.
- D22] The conceptual diagram of a white omission is shown in <u>drawing 4</u>. The same sign was given to the same ember as <u>drawing 3</u> among drawing. Moreover, 38 is a white omission part.
- D23] in the color filter for TFT mold liquid crystal devices, it be the purpose which protect TFT from outdoor ylight, or be the purpose which enlarge a numerical aperture and obtain a bright display, and the opening nfiguration of the black matrix 33 be complicated in recent years, and since what have two or more corner sections be nerally use, as show in drawing 4 (a), the problem that ink 36 be fully spread to this corner section occur. Moreover, case the black matrix 33 is formed, the photolithography process which generally used the resist is used, a ntamination may adhere to the front face of the transparence substrate 31 by the various components contained in a sist, and it may become the hindrance of diffusion of ink 36. Furthermore, since ink 36 will be crawled on the side se of the black matrix 33 compared with the front face of the transparence substrate 31 as shown in drawing 4 (b) ten the ** ink nature of the side face of the black matrix 33 is extremely high, the problem that a color becomes thin the part to which the black matrix 33 touches ink 36 may occur.
- Using the substrate parent-ink--ization-processed so that the field (crevice) surrounded by the black matrix eights) might serve as a contact angle 20 degrees or less to water in JP,9-203803,A as the technique of solving the oblem of such color mixture or a white omission is proposed. As an approach of giving parent ink nature, a water-luble leveling agent and a water-soluble, water-soluble surfactant are illustrated. Furthermore, in order to solve to incidence the problem over the color mixture mentioned above, the technique of processing the front face of heights the ** ink-ized processing agent beforehand, and giving ** ink nature is indicated, and the approach of carrying out a at with the solvent of a fluorine system is illustrated, using a fluorine content silane coupling agent as a ** ink-ized ocessing agent. moreover, as technique for forming only the surface layer of heights into ** ink alternatively, and not ming the side face of heights into ** ink in this case ** Carry out the laminating of two kinds of ingredients so that heights itself may produce such a property. ** after covering parts other than heights by the resist, forming a resist ver on ** transparence substrate which **-ink--ization-processes only the top face of heights and **-ink--ization-ocessing the whole surface, patterning of the resist layer is carried out according to a FOTORISO process, and heights of formed -- the approach of ** is illustrated.
- Moreover, in JP,9-230129,A, it considers as the approach of parent-ink--ization-processing a crevice, similarly, d the approach of irradiating an energy line is indicated. Also in this case, after considering as the approach of **-ink-ation-processing only the surface layer of heights, applying the photosensitive ingredient for glass substrate convex xtion formation and processing the whole surface in a ** ink-ized processing agent, the technique of carrying out tterning of the photosensitive ingredient according to a photolithography process is illustrated. Then, either is ernatively parent-ink--ization-processed simultaneous in heights and a crevice by the exposure of an energy line.

 126] However, since each of these approaches parent-ink--ization-processes a crevice after **-ink--ization-processing; front face of heights, in case they performs parent ink-ized processing, they has the problem of reducing the ** ink ture of the front face of the **-ink--ization-processed heights. Therefore, it is difficult to obtain sufficient ** ink ture for sufficient parent ink nature on the top face of a black matrix in a transparence substrate front face and the side se of a black matrix, respectively.
-)27] The above-mentioned problem is similarly produced, when manufacturing an electroluminescent element with ink jet method. That is, in an electroluminescent element, when giving this ink to the field surrounded by the septum, ng as ink the organic-semiconductor ingredient which emits light in each light of R, G, and B, forming a pixel minous layer) and ink is mixed between adjoining luminous layers, in the luminous layer concerned, the problem that ninescence of a desired color and brightness is not obtained arises. Moreover, since the amount of ink with which it is ed up in a septum is equalized even if it is the luminous layer of a single color, if ink flows into a contiguity pixel, erogeneity will arise in the amount of ink, and it will be recognized as brightness nonuniformity, and will become a oblem. Moreover, when ink is not fully spread in the field surrounded by the septum, the problem that luminescence ghtness sufficient in the boundary part of a luminous layer and a septum is not obtained is produced. In addition, in following description, generating of the luminescence brightness nonuniformity according mixture **** of the ink ween the luminous layers which adjoin for convenience when manufacturing an electroluminescent element to

pulsion of the ink in the boundary section of "color mixture", a luminous layer, and a septum is described as a "white aission."

928] The technical problem of this invention faces optical elements, such as a color filter and an electroluminescent ement, manufacturing cheaply in a simple process using an ink jet method, solves the above-mentioned problem, and to offer a reliable optical element with the sufficient yield. In case ink is specifically given in the field surrounded by septum, it is in forming the pixel which prevents the color mixture between the adjoining pixels, and is made to fully fuse ink in this field, and does not have a white omission. In this invention, it aims at offering more cheaply the liquid ystal device excellent in the color display property further using the optical element obtained by this manufacture proach.

D29] Ieans

leans for Solving the Problem] It is the manufacture approach of an optical element of having the septum which nsists of a resin constituent located on a support substrate between two or more pixels and the adjoining pixel at least, if first of this invention. The process which forms a positive type resist pattern in the field surrounded by the septum a support substrate, The process which covers the above-mentioned resist pattern and forms a resin constituent layer over a support substrate, The process which performs fluorination processing to the above-mentioned resin nstituent layer front face, and the process which removes the resin constituent layer on the above-mentioned resist ttern this whole resist pattern, and forms a septum, It is the manufacture approach of the optical element characterized having the process which gives ink to the field surrounded by the ink jet method by the above-mentioned septum, d forms a pixel in it.

330] It is the plasma treatment which above-mentioned this invention introduces the gas by which the above-mentioned fluorination processing contains a fluorine atom at least, and performs a plasma exposure, This protection-m-light agent is [forming the above-mentioned septum with the resin constituent containing a protection-from-light ent,] carbon black, Before the above-mentioned positive type resist pattern formation process, parent ink-ized occasing is performed on a support substrate front face, This parent ink-ized processing is the washing processing by alkali water solution, UV washing processing, excimer washing processing, corona discharge treatment, or oxygen is materialment, The above-mentioned ink's containing a hardening component, water, and an organic solvent at least d the above-mentioned ink contain a coloring agent, and it includes as a desirable mode manufacturing the color filter lose pixel is the coloring section, and manufacturing the electroluminescent element whose above-mentioned pixel is uminous layer.

331] Moreover, the second of this invention is an optical element characterized by having the septum located on a pport substrate between two or more pixels and the adjoining pixel at least, and being manufactured by the unufacture approach of the optical element of above-mentioned this invention.

32] The above-mentioned septum's being a protection-from-light layer and the above-mentioned support substrate transparence substrates, the second of above-mentioned this invention is the coloring section formed in the ink in the above-mentioned pixel contains a coloring agent, and it is the color filter equipped with the coloring section two or more colors, Having a protective layer on the above-mentioned coloring section, having the transparence actric conduction film on a front face, and the above-mentioned pixel are luminous layers, and it includes as a sirable mode that it is the electroluminescent element which has an electrode up and down on both sides of this ninous layer.

)33] Furthermore, it is the liquid crystal device characterized by having come to pinch liquid crystal between the ostrates of the third pair of this invention, and constituting one substrate using the color filter which is one mode of optical element of above-mentioned this invention.

)341

mbodiment of the Invention] In the process at which the manufacture approach of the optical element of this rention forms a septum on a support substrate After forming the resin constituent layer which forms a positive type sist pattern on a support substrate, and forms a septum on it, performing fluorination processing and increasing the ** nature of this resin constituent layer front face, by lift off It has the description for an ink jet method to give ink and m [remove the resin constituent layer on the above-mentioned resist pattern the whole resist pattern, form a septum, d] a pixel. Therefore, in this invention, when ink is given, while a lot of ink is also fully held and prevents color xture by the ** ink nature on the top face of a septum, a septum side face and a support substrate front face have high rent ink nature, ink is promptly damp, and breadth and a white omission are prevented.

)35] In addition, the liquid which has functionality optically and electrically after carrying out desiccation hardening the above "ink" in this invention is named generically, and it is not limited to the charge of a coloring matter used nventionally.

- 336] A color filter and an electroluminescent element are mentioned as an optical element of this invention unufactured by the manufacture approach of this invention. First, an operation gestalt is mentioned and explained out the optical element of this invention.
- 337] The cross section of an example of the color filter which is 1 operation gestalt of the optical element of this vention is typically shown in drawing 8. The black matrix to which 101 served as the transparence substrate as a pport substrate among drawing, and 102 served as the septum, the coloring section whose 103 is a pixel, and 104 are stective layers formed if needed. When it constitutes a liquid crystal device using the color filter of this invention, the n in which the protective layer 104 was formed on the coloring section 103 or the coloring section 103 may be formed d provided with the transparence electric conduction film which consists of transparence electric conduction material, ch as ITO (indium tin oxide) for driving liquid crystal, on it.
- D38] The cross section of 1 operation gestalt of the liquid crystal device of this invention constituted by using the lor filter of drawing 8 for drawing 9 is shown. Among drawing, as for a common electrode (transparence electric nduction film) and 108, an opposite substrate and 112 are orientation film a pixel electrode and 113, liquid crystal and 1 give the same sign to the same member as drawing 8, and the orientation film and 109 omit [107] explanation. D39] Generally an electrochromatic display component sets the substrate 101 and the opposite substrate 111 by the le of a color filter, and is formed by enclosing liquid crystal 109. Inside one substrate 111 of a liquid crystal device, T (un-illustrating) and the pixel electrode 112 are formed in the shape of a matrix. Moreover, inside the substrate 101 the side of a color filter, the coloring section 103 of a color filter is formed and the transparent common electrode 7 is formed on it in the location which counters the pixel electrode 112 so that R, G, and B may arrange. Furthermore, orientation film 108,113 is formed in the field of both substrates, and the liquid crystal molecule is made to arrange the fixed direction. Opposite arrangement is carried out through a spacer (un-illustrating), these substrates are stuck the sealant (un-illustrating), and the gap is filled up with liquid crystal 109.
- 040] In the case of a transparency mold, the above-mentioned liquid crystal device forms a substrate 111 and the pixel actrode 112 for a transparence material, pastes up a polarizing plate on the outside of each substrate, and displays by erating a liquid crystal compound as an optical shutter to which the permeability of the light of a back light is changed ing the back light which generally combined the fluorescent lamp and the scattered plate. Moreover, in the case of a lective mold, a substrate 111 or the pixel electrode 112 is formed for the material equipped with the reflex function, a reflecting layer is prepared on a substrate 111, a polarizing plate is prepared in the outside of the transparence ostrate 101, and it displays by reflecting the light which carried out incidence from the color filter side.
-)41] Moreover, the cross section of an example of the organic electroluminescent element (it is hereafter described as EL element") which are other operation gestalten of the optical element of this invention is shown in drawing 7. As the drive substrate whose 91 are a support substrate, the luminous layer a septum and whose 93 are pixels as for 92, 194, a transparent electrode and 96 are metal layers among drawing. This drawing shows only one pixel field for aplification.
-)42] The laminating of TFT (un-illustrating), the wiring film, the insulator layer, etc. is carried out to the multilayer, it is constituted possible [impression of an electrical potential difference] per luminous layer by the drive substrate between the transparent electrodes 94 arranged every metal layer 96 and luminous layer 93. The drive substrate 91 is inufactured according to a well-known thin film process.
- 143] About the structure of the organic EL device of this invention, if at least one side is the configuration which it mes at least to fill up luminescent material in the septum which becomes inter-electrode [which consists of the anode ite and cathode of transparence or a translucent pair] from a resin constituent, unless there is especially no limit, and structure can adopt a well-known thing and it deviates from the main point of this invention, various kinds of erations can be added.
-)44] The laminated structure is for example, (1) electrode (cathode) / luminous layer / hole-injection layer / electrode iode plate).
- An electrode (anode plate) / luminous layer / electron injection layer / electrode (cathode)
- An electrode (anode plate) / hole-injection layer / luminous layer / electron injection layer / electrode (cathode)
- An electrode (an anode plate or cathode) / luminous layer / electrode (cathode or anode plate)
- **** can apply this invention also to the EL element which has the laminating structure which prepared the organic nound layer of which the above-mentioned configuration.
- 145] The above (1) is called two-layer structure and (3) is called a monolayer configuration for a three-tiered structure. Although the organic EL device of this invention is based on these laminated structures, you may have two or more uctures which combined (1) to (4) other than these, and each layers. Moreover, a full color display may be realized by nbining with a color filter. The configuration of the organic EL device of this invention which consists of these

ninated structures, magnitude, the quality of the material, the manufacture approach, etc. are suitably chosen cording to the application of this organic EL device etc., and there is especially no limit about these.

- D46] Especially the luminescent material used for the luminous layer of the organic EL device of this invention is not nited, but can apply various things. A low-molecular fluorescent substance and a macromolecule fluorescent betance are desirable, and, specifically, a macromolecule fluorescent substance is still more desirable.
- 047] For example, as a low-molecular organic compound, although there is especially no limitation, it can use loring matter, such as naphthalene and its derivative, an anthracene and its derivative, perylene and its derivative, a ly methine system, a xanthene system, a coumarin system, and a cyanine system, 8-hydroxyquinoline and the metal mplex of the derivative, aromatic amine, a tetra-phenyl cyclopentadiene and its derivative, a tetra-phenyl butadiene, derivative, etc. Specifically, well-known things, such as what is indicated by JP,57-51781,A and JP,59-194393,A, are able
- 048] Moreover, as a giant-molecule organic compound usable as a luminescent material, although there is especially limitation, it can mention polyphenylene vinylene, the poly propine, the poly alkyl thiophene, the poly alkyl fluorene,
- 049] In addition, the giant-molecule fluorescent substance used for the organic EL device of this invention may be adom, a block, or a graft copolymer, and may be the giant molecule which has those in-between structures, for ample, the random copolymer which wore block nature. From a viewpoint which obtains a giant-molecule fluorescent bstance with the high quantum yield of fluorescence, a random copolymer, and the block or graft copolymer which are block nature is more desirable than a perfect random copolymer. Moreover, since the organic EL device of this vention uses luminescence from a thin film, that in which this macromolecule fluorescent substance has fluorescence the solid state is used.
- 950] As a good solvent to this giant-molecule fluorescent substance, chloroform, a methylene chloride, a chloroethane, a tetrahydrofuran, toluene, a xylene, etc. are illustrated. Although based also on the structure and plecular weight of a macromolecule fluorescent substance, it can be made to usually dissolve in these solvents 0.1% of a weight or more.
- 051] In the organic EL device of this invention, the electronic transportability ingredient which uses it into the extronic transportation layer in the case of preparing an electronic transportation layer further between the layers and thode containing luminescent material, or carries out mixed use with an electron hole transportation ingredient and ninescent material has the function to transmit the electron poured in from cathode to luminescent material. There is pecially no limit about such an electronic transportability ingredient, and the thing of arbitration can be conventionally osen and used out of a well-known compound.
- 052] as the desirable example of this electronic transportability ingredient -- nitration full -- me -- non, a derivative, an thra quinodimethan derivative, a diphenyl quinone derivative, a thiopyran dioxide derivative, a heterocycle racarboxylic acid anhydride, or a carbodiimide can be mentioned.
- 053] Furthermore, a deflection ORENIRIDEN methane derivative, an anthra quinodimethan derivative and an throne derivative, an OKISA diazole derivative, etc. can be mentioned. Moreover, although indicated as an ingredient nich forms a luminous layer, the metal complex of 8-hydroxyquinoline and its derivative etc. can be used as an extronic transportation ingredient.
- 054] Next, the typical production approach of an organic EL device of having the laminated structure which is an ample of this invention is described. With the electrode of a pair which consists of an anode plate and cathode, the ng in which transparence or a translucent electrode was formed on transparence substrates, such as clear glass and a insparent plastic, is used as transparence or a translucent electrode, for example.
- 355] Generally in the EL element of this invention, a luminous layer forms a thin film combining suitable bending sin. Although it can choose from bending resin wide range as the above-mentioned binder, for example, polyvinyl-rbazole resin, polycarbonate resin, polyester resin, polyarylate resin, butyral resin, polystyrene resin, polyvinyl-acetal sin, diallyl phthalate resin, acrylic resin, methacrylic resin, phenol resin, an epoxy resin, silicone resin, polysulfone sin, a urea-resin, etc. are mentioned, it is not limited to these. as that these are independent or a copolymer polymer -e sort -- or two or more sorts may be mixed and you may use. What has as big a work function as an anode material possible is good, for example, nickel, gold, platinum, palladium, a selenium, a rhenium, iridium, these alloys or tin ide, a tin oxide indium (ITO), and copper iodide are desirable. Moreover, conductive polymers, such as Pori (3-sthylthiophene), a polyphenylene sulfide, or polypyrrole, can also be used.
- 056] On the other hand, silver with a work function small as a cathode material, lead, tin, magnesium, aluminum, leium, manganese, an indium, chromium, or these alloys are used.
- 957] Below, with reference to a drawing, the manufacture approach of the optical element of this invention is

plained.

Drawing 1 and drawing 2 are process drawings showing the manufacture approach of the optical element of this vention typically. Each process is explained below. In addition, following process (a) - (h) corresponds to (a) - (h) of awing 1 and drawing 2. Moreover, in each process of drawing 1 and drawing 2, - (a-2) the mimetic diagram of a bstrate and on the right-hand side of space of - (a-1) on the left-hand side of space (h-1) (h-2) is the A-B cross section - (a-1) (h-1). For one, as for an ink jet head and 8, a support substrate, the field (opening) where a resin constituent ver and 5 were surrounded by the septum and 6 was surrounded [2 / a positive-resist layer and 3] for a resist pattern d 4 by the septum 5, and 7 are [ink and 9] pixels among drawing.

le support substrate 1 is prepared. Although the support substrate 1 is the transparence substrate 101 when unufacturing the color filter illustrated to <u>drawing 8</u>, and a glass substrate is generally used, if it has need properties, ch as desired transparency and a mechanical strength, a plastic plate etc. can be used in the purpose which constitutes iquid crystal device.

D60] Moreover, when manufacturing the EL element illustrated to <u>drawing 7</u>, the support substrate 1 is the drive betrate 91 in which the transparent electrode 94 was formed, and in observing luminescence from the substrate side neerned like <u>drawing 7</u>, it uses transparence substrates, such as a glass substrate, for the drive substrate 91. D61] It is desirable to perform parent ink-ized processing beforehand so that ink may be damp in the process (g) entioned later in the support substrate 1 and it may be easy breadth. As parent ink-ized processing, approaches, such washing processing by the alkali water solution, UV washing processing, excimer washing processing, corona scharge treatment, and oxygen plasma treatment, are used suitably, for example.

062] Process (b)

e positive-resist layer 2 is formed on the support substrate 1.

Of Process (c)

tterning of the positive-resist layer 2 is carried out, and a resist pattern 3 is formed. Finally a resist pattern 3 is noved, in that case, it carries out lift off of the resin constituent layer 4 formed in the upper layer, leaves the resin nstituent layer of a predetermined pattern, and forms a septum 5. Moreover, it is also a member for protecting the ld and support substrate 1 front face which turn into a side face of a septum 5 in the fluorination processing entioned later. Therefore, the pattern of a resist pattern 3 is formed so that it may become a pattern with a reverse ptum 5. In addition, it is necessary to use the ingredient which can be removed after fluorination processing as the sist concerned. When an alkali soluble positive resist is used especially, since support substrate 1 front face can be rent-ink--ization-processed by alkali cleaning at the time of this resist removal, the wettability at the time of ink grant comes high, the white omission prevention effectiveness increases more, and it is desirable.

)64] Process (d)

the support substrate 1, a resist pattern 4 is covered and the resin constituent layer 4 which is the material of a ptum 5 is formed on the whole surface. In this invention, although the resin ingredient of photosensitive [, such as oxy system resin, acrylic resin, polyimide system resin containing polyamidoimide, urethane system resin, polyester stem resin, and polyvinyl system resin,] or nonphotosensitivity can be used as a resin constituent used in order to m a septum 5, it is desirable to have the thermal resistance of 250 degrees C or more, and epoxy system resin, acrylic in, and polyimide system resin are preferably used from the point.

165] Moreover, in using this septum 5 as a protection-from-light layer, it uses the black resin constituent which made protection-from-light agent distribute into the above-mentioned resin constituent. Since high protection-from-light ture is obtained as this protection-from-light agent, it is desirable to use carbon black. As this carbon black What was nufactured by the contacting method currently called channel black, roller black, and disk black, Although what was nufactured by thermal ** currently called what manufactured by the fur nesting method currently called gas fur nest ick and oil fur nest black, thermal black, and acetylene black can be used Especially, channel black, gas fur nest ick, and oil fur nest black are desirable. Furthermore, the mixture of the pigment of R, G, and B etc. may be added if eded. Moreover, the black resist generally marketed can also be used. The protection-from-light layer formed into the resistance if needed may be used.

166] The resin constituent layer 4 can be formed by approaches, such as a spin coat, a roll coat, a bar coat, a spray at, a DIP coat, or print processes.

)67] Process (e)

normation processing is performed to resin constituent layer 4 front face, and the ** ink nature of this front face is reased. As the fluorination processing concerned, a process is easy and the plasma treatment which introduces the gas nich contains a fluorine atom at least, and performs a plasma exposure is preferably used as an approach that resin

nstituent layer 4 front face can be fluorinated good, and ** ink nature can be increased.

D68] It is desirable to use one or more sorts of halogen gas which is used in the process concerned and which is osen from CF4, CHF3, C2F6, SF6, C3F8, and C5F8 as gas which contains a fluorine atom at least. Especially C5F8 ctafluoro cyclopentene) have an atmospheric-air life very as short as 0.98 (CF 4:5** year, C4F 8:3200 years) mpared with conventional gas, while ozone-crack ability is 0. Therefore, a global warming potential is very F4:6500, C4F8:8700) small compared with 90 (100-year addition value set to CO 2= 2), and conventional gas, and ry effective in an ozone layer or earth environmental protection, and it is desirable when using it by this invention. D69] Furthermore, as introductory gas, gas, such as oxygen, an argon, and helium, may be used together if needed. In s process, it becomes possible to control extent of the ** ink nature of resin constituent layer 4 front face by which orination processing will be carried out in this process in the halogen gas chosen from the above CF4 and CHF3, F6, SF6, C3F8, and C5F8 if the mixed gas of one or more sorts and O2 is used. however, the mixed gas concerned -- ting -- the mixing ratio of O2 -- O since the oxidation reaction by O2 will become dominant and the ** ink sposition top effectiveness will be barred, if a rate exceeds 30% -- the case where the mixed gas concerned is used ice the damage to resin will become remarkable if a rate exceeds 30% 2 mixing ratio -- the mixing ratio of O2 -- a rate eds to use it in 30% or less of range.

- D70] Moreover, as the generating approach of the plasma, methods, such as low frequency discharge, high frequency scharge, and microwave discharge, can be used, and conditions, such as a pressure at the time of being plasma atment, a quantity of gas flow, a discharge frequency, and the processing time, can be set as arbitration.
- D71] The mimetic diagram of the plasma generator which can be used for the above-mentioned plasma treatment ocess at <u>drawing 5</u> and <u>drawing 6</u> is shown. For 51, as for a lower electrode and 53, an up electrode and 52 are [a ocessed substrate and 54] RF electrodes among drawing. The equipment concerned impresses high-frequency voltage 2 parallel monotonous pole electrodes, and generates the plasma. <u>Drawing 5</u> can show a cathode coupling method, awing 6 can show the equipment of an anode coupling method, and ** ink nature of resin constituent layer 4 front se can be made into desired extent also in which method according to conditions, such as a pressure, a quantity of gas w, a discharge frequency, and the processing time.
- D72] In the plasma generator shown in <u>drawing 5</u> and <u>drawing 6</u>, the cathode coupling method of <u>drawing 5</u> can orten the processing time, and is advantageous to the down stream processing concerned. Moreover, it is vantageous at the point of not giving a damage to the support substrate 1 by the anode coupling method of <u>drawing 6</u> yound the need. Therefore, what is necessary is just to choose the plasma generator used for this process according to a ingredient of the support substrate 1 or the resin constituent layer 4.
-)73] Process (f)
- coording to a lift-off process, the resin constituent layer 4 on a resist pattern 3 is removed the whole resist pattern 3, resin constituent layer 4 left behind if needed is heat-hardened, and a septum 5 is formed.
-)74] Although it differs as the removal approach of a resist pattern 3 according to the quality of the material of the sist used, it is necessary to use the approach of not having a bad influence on the adhesion of a septum 5, and the ** a nature of septum 5 top face by which fluorination processing was carried out. For example, there are an approach of solving with an alkali water solution or an organic solvent and the approach of using an ultraviolet-rays energy posure together in addition to it.
-)75] According to these processes of a series of, only septum 5 top face has ** ink nature, and the matrix pattern ostrate with which support substrate 1 front face exposed to the field surrounded by the septum 5 and the side face of eptum 5 have parent ink nature is obtained.
-)76] Process (g)
- c 8 is given to the field (opening 6) surrounded by the septum 5 from the ink jet head 7 using an ink jet recording paratus. As an ink jet, the bubble jet (trademark) type which used the electric thermal-conversion object as an energy neration component, or the piezo jet type using a piezoelectric device is usable. Moreover, in the case of the thing and element which in the case of a color filter contain the coloring agent of each color so that the coloring section of R, and B may be formed after hardening, as ink 8, the ingredient which forms the luminous layer which emits light by extrical-potential-difference impression after hardening is used. As for ink 8, in any case, what contains a hardening mponent, water, and a solvent at least is desirable. The presentation of the ink used for it when manufacturing a color cer to below by the manufacture approach of this invention is further explained to a detail.
-)77] [1] As a coloring agent made to contain in ink by coloring agent this invention, although a color system and a ment system are usable, when using a pigment, since homogeneity is distributed in ink, addition of a dispersant is eded separately and the coloring agent ratio in total solids becomes low, the coloring agent of a color system is used afterably. Moreover, it is desirable that they are the hardening component mentioned later and below tales doses as an

dition of a coloring agent.

978] [2] When the process resistance in an after [a hardening component] process, dependability, etc. are taken into nsideration, it is desirable to contain components, such as the component which hardens by processing of heat atment or an optical exposure, and fixes a coloring agent, i.e., the monomer for which a bridge can be constructed, d a polymer. When the thermal resistance in a back process is especially taken into consideration, it is desirable to use resin constituent which can be hardened. Specifically, vinyl system polymers, such as cellulosics, such as acrylic sin and silicone resin; which has functional groups, such as a hydroxyl group, a carboxyl group, an alkoxy group, and amide group, or hydroxypropylcellulose, hydroxyethyl cellulose, methyl cellulose, and a carboxymethyl cellulose, see denaturation objects; or a polyvinyl pyrrolidone, polyvinyl alcohol, and a polyvinyl acetal, are mentioned as base aterial resin. Furthermore, it is possible to use the cross linking agent for stiffening these base material resin by an tical exposure or heat-treatment and a photoinitiator. Specifically as a cross linking agent, melamine derivatives, such a methylol-ized melamine, have dichromate, a bis-azide compound, a radical system initiator, a cation system tiator, an usable anion system initiator, etc. as a photoinitiator again. Moreover, two or more sorts of these otoinitiators can be mixed, or it can also be used combining other sensitizers.

979] [3] As a medium of the ink used by solvent this invention, the mixed solvent of water and an organic solvent is ed preferably. It is desirable to use not the common water that contains various ion as water but ion exchange water eionized water).

080] As an organic solvent, methyl alcohol, ethyl alcohol, n-propyl alcohol, Isopropyl alcohol, n-butyl alcohol, sectyl alcohol, Alkyl alcohols of the carbon numbers 1-4, such as tert-butyl alcohol; Dimethylformamide, Amides, such dimethylacetamide; Ketones, such as an acetone and diacetone alcohol, or a keto alcohol; tetrahydrofuran, Ether, ch as dioxane; Polyalkylene glycols; ethylene glycol, such as a polyethylene glycol and a polypropylene glycol, opylene glycol, a butylene glycol, triethylene glycol, Thiodiglycol and the alkylene glycol; glycerols in which it sees and alkylene groups, such as a xylene glycol and a diethylene glycol, contain 2-4 carbon; Ethylene glycol nomethyl ether, The low-grade alkyl ether of polyhydric alcohol, such as diethylene-glycol methyl ether and the ethylene glycol monomethyl ether; it is desirable to choose from a N-methyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidone, etc. 081] Moreover, in order to consider as the ink which has a desired physical-properties value other than the above-intioned component if needed, two or more kinds of organic solvents with which the boiling points differ may be xed and used, or a surfactant, a defoaming agent, antiseptics, etc. may be added.

082] Process (h)

pixel 9 is formed by performing required processings, such as heat treatment and an optical exposure, and removing d stiffening the solvent component in ink 8.

D83] Furthermore, in the case of a color filter, as described above, a protective layer and the transparence electric nduction film are formed if needed. It is usable, if the inorganic film formed of a resin ingredient a photo-curing type, neat-curing type, or light-and-heat concomitant use hardening type or vacuum evaporationo, a spatter, etc. can be used a protective layer in this case, it has the transparency at the time of considering as a color filter and a subsequent insparence electric conduction film formation process, an orientation film formation process, etc. can be borne. oreover, the transparence electric conduction film may be directly formed on the coloring section, without minding a preceditive layer. Moreover, in the case of an EL element, required members, such as a metal layer, are formed on a seel.

084]

xample] (Example 1)

ormation of a resist pattern] UV washing processing of the glass substrate ("1737" by Corning) was carried out, the sitive type photoresist (Tokyo adaptation make "an OFPR resist") was applied so that thickness might be set to 1.5 crometers, predetermined exposure, development, and BEKU processing were performed, and the resist of a micrometerx225micrometer rectangle obtained the resist pattern arranged in all directions. [two or more] 085] [Formation of a resin constituent layer] Subsequently, on the glass substrate with which the above-mentioned sist pattern was formed, the graphite coating for black matrices (Hitachi Powdered Metals make) was applied so that ckness might be set to 2 micrometers.

luorination processing] The plasma treatment equipment of an parallel monotonous mold was used for the glass betrate which formed the graphite coating layer as the above-mentioned resin constituent layer, and plasma treatment is performed on condition that the following.

)861

is used: CF4 quantity of gas flow: 80sccm pressure: 8PaRF power: The 150W processing time: 60sec[0087] [Lift f of a resin constituent layer] after exposing completely the glass substrate which performed the above-mentioned

isma treatment from a rear face and being immersed in an alkali water solution (Tokyo adaptation make "a NMD veloper"), by spraying pure water by the high-pressure spray The graphite coating on a resist pattern was removed the iole resist pattern, heat treatment for 30 minutes was performed at 200 degrees C, and 2 micrometers of thickness and black matrix pattern which has opening of a 75micrometerx225micrometer rectangle were formed.

D88] [Evaluation of ** ink nature] When the contact angle over the pure water of the substrate (black matrix substrate) which the above-mentioned black matrix was formed was measured, it was black matrix top-face:130 degree glass ostrate surface:20 degree.

)89] [Adjustment of ink] Each ink of R, G, and B was prepared by the following presentations, using the acrylic polymer which consists of a presentation shown below as a heat-curing component.

Hardening component methyl methacrylate 50 weight sections hydroxyethyl methacrylate 30 weight sections N-thylol acrylamide 20 weight sections [0091] R ink C.I. acid Orange 148 3.5 weight sections C.I. acid red 289 0.5 ight sections diethylene glycol 30 weight sections ethylene glycol 20 weight sections ion exchange water The 40 ight sections above-mentioned hardening component Six weight sections [0092] G ink C.I. acid yellow 23 Two ight sections zinc phthalocyanine sulfo amide Two weight sections diethylene glycol 30 weight sections ethylene col 20 weight sections ion exchange water The 40 weight sections above-mentioned hardening component Six ight sections [0093] B ink C.I. direct blue 199 Four weight sections diethylene glycol 30 weight sections ethylene col 20 weight sections ion exchange water The 40 weight sections above-mentioned hardening component Six ight sections [0094] [Production of the coloring section] Using the ink jet recording apparatus possessing the ink jet ad of discharge quantity 20pl, per opening, every 100pl(s), Above R and G and B ink were changed and the amount is given for them in the range of 200-800pl to the above-mentioned black matrix substrate. Subsequently, 230 degrees performed heat treatment for 30 minutes succeedingly for 10 minutes at 90 degrees C, ink was stiffened, it considered the coloring section (pixel), and seven kinds of color filters with which the amounts of ink grants differ were oduced.

195] [Evaluation of color mixture and a white omission] When the obtained color filter was observed with the optical croscope, color mixture and a white omission were observed in no color filters.

196] (Example 2) After performing oxygen plasma treatment to a glass substrate, the positive type photoresist was plied and the color filter was produced like the example 1 except having replaced the gas used in fluorination occasing with C2F6 from CF4 gas.

)97] [Evaluation of ** ink nature] When the contact angle over the pure water of a black matrix substrate was asured, it was black matrix top-face:130 degree glass substrate surface:10 degree.

198] [Evaluation of color mixture and a white omission] When the obtained color filter was observed with the optical croscope, color mixture and a white omission were observed in no color filters.

199] (Example 1 of a comparison) The color filter was produced like the example 1 except not performing orination processing.

.00] [Evaluation of ** ink nature] When the contact angle over the pure water of a black matrix substrate was asured, it was black matrix top-face:70 degree glass substrate surface:20 degree.

01] [Evaluation of color mixture and a white omission] When the obtained color filter was observed with the optical croscope, in the color filter of 400 or more pls, color mixture was observed for the amount of grants of ink. The white ission was not observed.

.02] (Example 2 of a comparison) The color filter was produced like the example 1 except not performing UV shing of a glass substrate and not performing fluorination processing, either.

03] [Evaluation of ** ink nature] When the contact angle over the pure water of a black matrix substrate was asured, it was black matrix top-face:70 degree glass substrate surface:60 degree.

04] [Evaluation of color mixture and a white omission] When the obtained color filter was observed with the optical croscope, the white omission was observed in all color filters. Moreover, in the color filter of 400 or more pls, color xture was observed for the amount of grants of ink.

05] (Example 3) wiring film, an insulator layer, etc. which were formed of the thin film process are set to 40nm by ittering in ITO as a transparent electrode per pixel (luminous layer) on the TFT drive substrate which comes to carry a laminating to a multilayer -- as -- forming -- FOTORISO -- according to the pixel configuration, patterning was formed by law.

06] Next, the septum filled up with a luminous layer was formed. After carrying out UV washing processing of the ve-mentioned TFT substrate like an example 1, the positive type photoresist was applied so that thickness might be to 1.0 micrometers, predetermined exposure, development, and BEKU processing were performed, and the nicrometerx225micrometer resist pattern was formed. Subsequently, after applying and prebaking a transparence

otopolymer (product made from the Fuji Photo Film aurin "CT-2000L") so that it may become 0.5 micrometers of ckness, heat treatment for 30 minutes was performed at the same fluorination processing as an example 1, lift-off ocessing, and 200 degrees C, and the transparent matrix pattern which has opening of 0.5 micrometers of thickness d a 75micrometerx225micrometer rectangle on the above-mentioned ITO transparent electrode was created. The ntact angle over each pure water was :105 degree on the ITO transparent electrode top:17-degree transparence matrix ttern on the ITO transparent electrode and the transparence matrix pattern.

107] Next, it was filled up with the luminous layer in the septum of said substrate. As a luminous layer, it is the extronic transportability 2 and electronic transportability blue luminescence coloring matter with 5-screw (5-tert-butyl-benzo OKISAZORUIRU)-thiophene [fluorescence peak 450nm, and is one of the emission center formation mpounds. Both were dissolved in the dichloroethane solution so that molecular dispersion of the]30 % of the weight scribed as "BBOT" could be hereafter carried out into the hole transportability host compound which consists of Polly vinylcarbazole [it is described as "PVK" molecular weight 150,000, the Kanto chemistry company make, and the lowing]. Further, the Nile red which is another emission center formation compound was dissolved in the shloroethane solution of this PVK-BBOT so that it might become 0.015-mol %, and it filled up and dried by having ed this solution as ink to the opening circles surrounded by the ink jet method by transparence resin, and the luminous er with a thickness of 200nm was formed. At this time, each pixel (luminous layer) became independent and the lution which contains said luminescent material between septa was not mixed by the contiguity pixel. Furthermore, on s, vacuum deposition of Mg:Ag (10:1) was carried out, and Mg:Ag cathode with a thickness of 200nm was formed. us, when the electrical potential difference of 18V was impressed to each pixel of the produced EL element, uniform ite luminescence of 480 cd/m2 was obtained.

ffect of the Invention] As explained above, according to this invention, the EL element which does not have rocess / simple] luminescence brightness nonuniformity by the ink jet method within the color filter which can nufacture with the sufficient yield and does not have concentration nonuniformity in the coloring department, and a ninous layer in an optical element with the high dependability equipped with the pixel without color mixture or a nite omission can be offered with the sufficient yield. Therefore, the liquid crystal device excellent in the color display operty can be more cheaply offered using the above-mentioned color filter.

ranslation done.]

NOTICES *

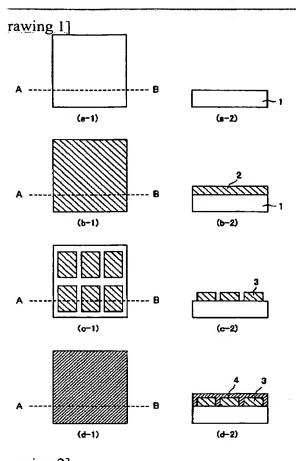
pan Patent Office is not responsible for any mages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

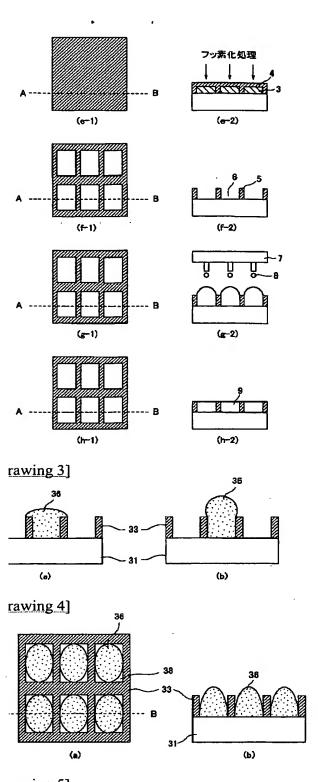
**** shows the word which can not be translated.

In the drawings, any words are not translated.

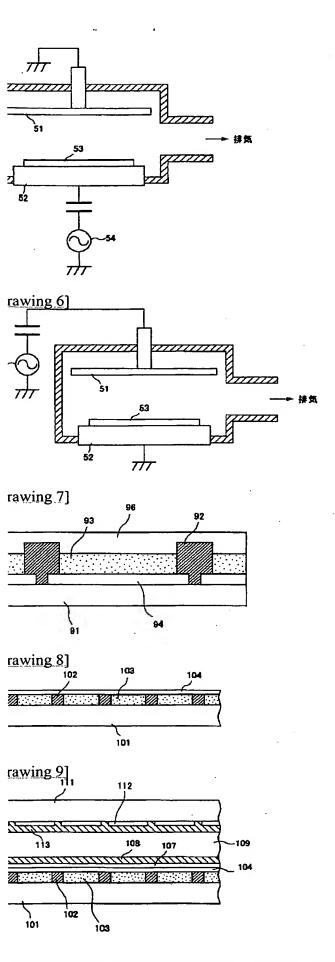
LAWINGS



rawing 2]



rawing 5]



ranslation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-55222

(P2002-55222A) (43)公開日 平成14年2月20日(2002.2.20)

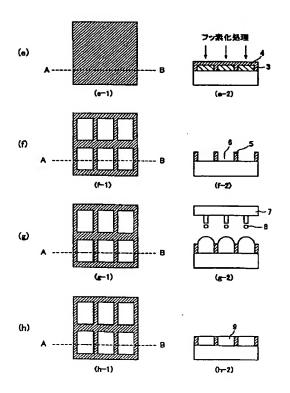
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI		テーマコード(参考
G02B 5/20	101	G02B 5/20	101	2C056
B41J 2/01		G02F 1/1335	505	2Н048
G02F 1/1335	505	G03F 7/40	521	2H091
G03F 7/40	521	B41J 3/04	101 Z	2Н096
		審査請求未	た請求 請求項の数16	OL (全13頁)
(21)出願番号	特願2000-243590(P2000-243590)	(71)出願人 000	0001007	
		+	ヤノン株式会社	
(22) 出願日	平成12年8月11日(2000.8.11)	東	京都大田区下丸子37	丁目30番2号
		(72)発明者 芝	昭二	
		東江	京都大田区下丸子37	丁目30番2号 キヤ
)	ン株式会社内	
		(72)発明者 高	野 勝彦	
	•	東	京都大田区下丸子37	丁目30番2号 キヤ
)	ン株式会社内	
		(74)代理人 100	0096828	
		弁	理士 渡辺 敬介	(外1名)
		最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】光学素子とその製造方法、液晶素子

(57)【要約】

【課題】 インクジェット方式による光学素子の製造方法において、混色、白抜けを防止する。

【解決手段】 支持基板1上にポジ型レジストパターン3を形成し、その上に全面に樹脂組成物層4を形成し、フッ素化処理を施して樹脂組成物層4表面の撥インク性を増大させた後、リフトオフによりレジストパターン3上の樹脂組成物層4を該レジストパターン3ごと除去して隔壁5を形成し、開口部6にインク8を付与して画素9を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持基板上に複数の画素と隣接する画素 間に位置する樹脂組成物からなる隔壁とを少なくとも有 する光学素子の製造方法であって、支持基板上の隔壁で 囲まれる領域にポジ型レジストパターンを形成する工程 と、上記レジストパターンを覆って支持基板全面に樹脂 組成物層を形成する工程と、上記樹脂組成物層表面にフ ッ素化処理を施す工程と、上記レジストパターン上の樹 脂組成物層を該レジストパターンごと除去して隔壁を形 まれた領域にインクを付与して画素を形成する工程と、 を有することを特徴とする光学素子の製造方法。

1

【請求項2】 上記フッ素化処理が、少なくともフッ素 原子を含有するガスを導入してプラズマ照射を行うプラ ズマ処理である請求項1に記載の光学素子の製造方法。

【請求項3】 上記隔壁を、遮光剤を含有する樹脂組成 物で形成する請求項1または2に記載の光学素子の製造 方法。

【請求項4】 上記遮光剤がカーボンプラックである請 求項3に記載の光学素子の製造方法。

【請求項5】 上記ポジ型レジストパターン形成工程よ りも前に、支持基板表面に親インク化処理を施す請求項 1~4のいずれかに記載の光学素子の製造方法。

【請求項6】 上記親インク化処理が、アルカリ水溶液 による洗浄処理、UV洗浄処理、エキシマ洗浄処理、コ ロナ放電処理、酸素プラズマ処理のいずれかである請求 項5に記載の光学素子の製造方法。

【請求項7】 上記インクが少なくとも硬化成分、水、 有機溶剤を含有する請求項1~6のいずれかに記載の光 学素子の製造方法。

上記インクが着色剤を含有し、画素が着 【請求項8】 色部であるカラーフィルタを製造する請求項1~7のい ずれかに記載の光学素子の製造方法。

【請求項9】 上記画素が発光層であるエレクトロルミ ネッセンス素子を製造する請求項1~7のいずれかに記 載の光学素子の製造方法。

【請求項10】 支持基板上に複数の画素と隣接する画 素間に位置する隔壁とを少なくとも有し、請求項1~7 のいずれかに記載の光学素子の製造方法により製造され たことを特徴とする光学素子。

【請求項11】 上記隔壁が遮光層である請求項10に 記載の光学素子。

【請求項12】 上記支持基板が透明基板であり、上記 画素が着色剤を含有するインクで形成された着色部であ り、複数色の着色部を備えたカラーフィルタである請求 項10または11に記載の光学素子。

【請求項13】 上記着色部上に保護層を有する請求項 12に記載の光学素子。

【請求項14】 表面に透明導電膜を有する請求項12 または13に記載の光学素子。

上記画素が発光層であり、該発光層を 【請求項15】 挟んで上下に電極を有するエレクトロルミネッセンス素 子である請求項10または11に記載の光学素子。

【請求項16】 一対の基板間に液晶を挟持してなり、 一方の基板が請求項12~14のいずれかに記載の光学 素子を用いて構成されたことを特徴とする液晶素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーテレビ、パ 成する工程と、インクジェット方式により上記隔壁で囲 10 ーソナルコンピュータ、パチンコ遊技台等に使用されて いるカラー液晶素子の構成部材であるカラーフィルタ、 及び、複数の発光層を備えたフルカラー表示のエレクト ロルミネッセンス素子といった光学素子を、インクジェ ット方式を利用して製造する製造方法に関し、さらに は、該製造方法により製造される光学素子、及び該光学 素子の一つであるカラーフィルタを用いてなる液晶素子 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータの発達、 20 特に携帯用パーソナルコンピュータの発達に伴い、液晶 ディスプレイ、特にカラー液晶ディスプレイの需要が増 加する傾向にある。しかしながら、さらなる普及のため にはコストダウンが必要であり、特にコスト的に比重の 重いカラーフィルタのコストダウンに対する要求が高ま っている。

【0003】従来から、カラーフィルタの要求特性を満 足しつつ上記の要求に応えるべく、種々の方法が試みら れているが、未だ全ての要求特性を満足する方法は確立 されていない。以下にそれぞれの方法を説明する。

30 【0004】第一の方法は染色法である。染色法は、先 ず透明基板上に染色用の材料である、水溶性の高分子材 料層を形成し、これをフォトリソグラフィ工程により所 望の形状にパターニングした後、得られたパターンを染 色浴に浸漬して着色されたパターンを得る。この工程を 3回繰り返すことにより、R(赤)、G(緑)、B (青) の3色の着色部からなる着色層を形成する。

【0005】第二の方法は顔料分散法であり、近年最も 盛んに行われている。この方法は、先ず透明基板上に顔 料を分散した感光性樹脂層を形成し、これをパターニン 40 グすることにより、単色のパターンを得る。この工程を 3回繰り返すことにより、R、G、Bの3色の着色部か らなる着色層を形成する。

【0006】第三の方法としては電着法がある。この方 法は、先ず透明基板上に透明電極をパターニングし、顔 料、樹脂、電解液等の入った電着塗装液に浸漬して第一 の色を電着する。この工程を3回繰り返して、R、G、 Bの3色の着色部からなる着色層を形成し、最後に焼成 するものである。

【0007】第四の方法としては、熱硬化型の樹脂に顔 50 料を分散し、印刷を3回繰り返すことにより、R、G、

Bを塗り分けた後、樹脂を熱硬化させることにより、着 色層を形成するものである。いずれの方法においても、 着色層の上に保護層を形成するのが一般的である。

【0008】これらの方法に共通している点は、R、 G、Bの3色を着色するために同一の工程を3回繰り返 す必要があり、コスト高になることである。また、工程 数が多い程、歩留まりが低下するという問題も有してい る。さらに、電着法においては、形成可能なパターン形 状が限定されるため、現状の技術ではTFT型(TF T、即ち薄膜トランジスタをスイッチング素子として用 10 いたアクティブマトリクス駆動方式)の液晶素子の構成 には適用困難である。

【0009】また、印刷法は解像性が悪いため、ファイ ンピッチのパターン形成には不向きである。

【0010】上記のような欠点を補うべく、近年、イン クジェット方式を利用したカラーフィルタの製造方法が 盛んに検討されている。インクジェット方式を利用した 方法は、製造プロセスが簡略で、低コストであるという 利点がある。

【0011】一方、インクジェット方式はカラーフィル 20 夕の製造に限らず、エレクトロルミネッセンス素子の製 造にも応用が可能である。

【0012】エレクトロルミネッセンス素子は、蛍光性 の無機及び有機化合物を含む薄膜を、陰極と陽極とで挟 んだ構成を有し、上記薄膜に電子及び正孔(ホール)を 注入して再結合させることにより励起子を生成させ、こ の励起子が失活する際の蛍光の放出を利用して発光させ る素子である。このようなエレクトロルミネッセンス素 子に用いられる蛍光性材料を、例えばTFT等素子を作 り込んだ基板上にインクジェット方式により付与して発 30 光層を形成し、素子を構成することができる。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、イン クジェット方式は製造プロセスの簡略化及びコスト削減 を図ることができることから、カラーフィルタやエレク トロルミネッセンス素子といった光学素子の製造へ応用 されている。しかしながら、このような光学素子の製造 において、インクジェット方式特有の問題として、「混 色」及び「白抜け」と言った問題がある。以下、カラー フィルタを製造する場合を例に挙げて説明する。

【0014】「混色」は、隣接する異なる色の画素(着 色部)間においてインクが混ざり合うことにより発生す る障害である。ブラックマトリクスを隔壁として、該ブ ラックマトリクスの開口部にインクを付与して着色部を 形成するカラーフィルタの製造方法においては、ブラッ クマトリクスの開口部の容積に対して、数倍~数十倍の 体積を有するインクを付与する必要がある。インク中に 含まれる着色剤や硬化成分等の固形分濃度が高い場合、 即ち付与するインクの体積が比較的少ない場合において

ブラックマトリクスの開口部内にインクを保持すること ができるため、付与されたインクがブラックマトリクス を乗り越えて、隣接する異なる色の着色部にまで到達す ることはない。しかしながら、インク中の固形分濃度が 低い場合、即ち多量のインクを付与する必要がある場合 には、隔壁となるプラックマトリクスを超えてインクが あふれてしまうため、隣接する着色部間で混色が発生し てしまう。特に、インクジェットヘッドのノズルより安 定して吐出可能なインクの粘度には限界があり、インク 中に含有される固形分の濃度にも限界があるため、混色 を回避するための技術が必要である。

【0015】そこで、着色部と隔壁との間におけるイン クの濡れ性の差を利用して混色を防止する方法が提案さ れている。例えば、特開昭59-75205号において は、インクが目的領域外へ広がることを防止するため、 濡れ性の悪い物質で拡散防止パターンを形成する方法が 提案されているが、具体的な技術は開示されていない。 一方、特開平4-123005号においては、具体的な 手法として、撥水、撥油作用の大きなシリコーンゴム層 をパターニングして混色防止用の仕切壁とする方法が提 案されている。さらに、特開平5-241011号や特 開平5-241012号においても同様に、遮光層とな るプラックマトリクス上にシリコーンゴム層を形成し、 混色防止用の隔壁として用いる手法が開示されている。

【0016】これらの方法によれば、隔壁の高さをはる かに超える量のインクを付与した場合においても、隔壁 の表面層が撥インク性を示すためにインクがはじかれ、 隔壁を超えて隣接する着色部にまで及ぶことがなく、有 効に混色を防止することができる。

【0017】図3にその概念図を示す。図中、31は透 明基板、33は隔壁を兼ねたプラックマトリクス、36 はインクである。プラックマトリクス33の上面が撥イ ンク性を有する場合には、図3 (b) に示すように、付 与されたインク36がプラックマトリクス33の開口部 中に保持され、隣接する着色部にまで達することはな い。しかしながら、プラックマトリクス33の上面の撥 インク性が低い場合には、図3(a)に示すように、付 与されたインク36がブラックマトリクス33上にまで **溜れ広がり、隣接する開口部に付与されたインクと混じ** 40 り合ってしまう。

【0018】また、一般的にはシリコン化合物を用いる よりも、フッ素化合物を用いる方がより優れた撥インク 性を得ることができる。例えば、特開2000-355 11号において、遮光部上にポジ型のレジストパターン を形成し、さらに該パターン上に撥インク化処理剤を塗 布する方法が開示されており、撥インク化処理剤として は、フッ素化合物を用いることが開示されている。しか しながら、この方法の場合、遮光部上に設けられたポジ 型レジストパターンを着色部形成後に除去する必要があ は、ブラックマトリクスが十分に隔壁として機能し、該 50 るが、レジストパターンを除去する際に画素の溶解、剥

離、膨潤といった問題を生じる場合がある。

【0019】また、樹脂層の表面をフッ素化する手法としては、特開平6-65408号にフッ素化合物の反応ガスをプラズマ化して処理する方法が提案されている。さらに、この技術をカラーフィルタに適用した例としては、特開平11-271753号において、隔壁をインクに対して親和性を有する下層と、非親和性を有する上層の多層構造とし、上層をインクに対して非親和性とする手法として、フッ素化合物を含むガスによりプラズマ処理する方法が開示されている。

【0020】しかしながら、上述した手法はいずれも隔壁を多層化するものであり、フォトリソグラフィ工程を複数回実施する必要があることから、プロセスの複雑化、コストアップ、ひいては歩留まり低下を招くという問題がある。

【0021】一方、「白抜け」は、主に付与されたインクが隔壁によって囲まれた領域内に十分且つ均一に拡散することができないことに起因して発生する障害であり、色ムラやコントラストの低下といった表示不良の原因となる。

【0022】図4に、白抜けの概念図を示す。図中、図3と同じ部材には同じ符号を付した。また、38は白抜け部分である。

【0023】近年、TFT型液晶素子用のカラーフィル 夕においては、TFTを外光から保護する目的で、或い は、開口率を大きくして明るい表示を得る目的で、プラ ックマトリクス33の開口部形状が複雑になっており、 複数のコーナー部を有するものが一般的に使用されてい るため、図4(a)に示すように、該コーナー部に対し てインク36が十分に拡散しないという問題が発生す る。また、ブラックマトリクス33を形成する際には、 一般的にレジストを用いたフォトリソグラフィ工程が使 用されており、レジストに含まれる種々の成分により透 明基板31の表面に汚染物が付着して、インク36の拡 散の妨げとなる場合がある。さらに、透明基板31の表 面に比べて、プラックマトリクス33の側面の撥インク 性が極端に高い場合、図4(b)に示すように、プラッ クマトリクス33の側面でインク36がはじかれてしま うため、インク36とプラックマトリクス33が接する 部分で色が薄くなるという問題が発生する場合もある。 【0024】このような混色や白抜けの問題を解決する 手法として、特開平9-203803号においては、プ ラックマトリクス(凸部)に囲まれた領域(凹部)が、 水に対して20°以下の接触角となるよう親インク化処 理された基板を用いることが提案されている。親インク 性を付与する方法としては、水溶性のレベリング剤や水 溶性の界面活性剤が例示されている。さらに、上述した 混色に対する問題を同時に解決するために、凸部の表面 を予め撥インク化処理剤で処理して撥インク性を付与す る手法が開示されており、撥インク化処理剤としてフッ 50

素含有シランカップリング剤を用い、フッ素系の溶剤で コートする方法が例示されている。また、この際、凸部 の表面層のみを選択的に撥インク化し、凸部の側面を撥 インク化しないための手法として、

①凸部自体がそのような性質を生じるよう 2 種類の材料 を積層する、

②凸部以外の部分をレジストで覆って、凸部の上面のみを撥インク化処理する、

②透明基板上にレジスト層を形成し、全面を撥インク化 10 処理した後、フォトリソ工程によりレジスト層をパター ニングして凸部を形成する、等の方法が例示されてい る。

【0025】また、特開平9-230129号においては、同様に、凹部を親インク化処理する方法として、エネルギー線を照射する方法が開示されている。この場合にも、凸部の表面層のみを撥インク化処理する方法として、ガラス基板上に凸部形成用の感光性材料を塗布し、全面を撥インク化処理剤にて処理した後、フォトリソグラフィ工程により感光性材料をパターニングする手法が20例示されている。その後、エネルギー線の照射により凸部と凹部を同時に、もしくはどちらかを選択的に親インク化処理するものである。

【0026】しかしながら、これらの方法はいずれも凸部の表面を撥インク化処理した後に凹部を親インク化処理するものであることから、親インク化処理を行う際に撥インク化処理された凸部の表面の撥インク性を低下させてしまうという問題がある。そのため、透明基板表面及びブラックマトリクスの側面においては十分な親インク性を、ブラックマトリクスの上面においては十分な撥30 インク性をそれぞれ得ることは困難である。

【0027】上記問題は、インクジェット方式によりエ レクトロルミネッセンス素子を製造する場合にも同様に 生じる。即ち、エレクトロルミネッセンス素子におい て、例えばR、G、Bの各光を発光する有機半導体材料 をインクとして用い、隔壁で囲まれた領域に該インクを 付与して画素(発光層)を形成する際に、隣接する発光 層間でインクが混じり合った場合、当該発光層では所望 の色、輝度の発光が得られないという問題が生じる。ま た、単一色の発光層であっても、隔壁内に充填するイン ク量を均一化しているため、隣接画素へインクが流入す ると、インク量に不均一性が生じ、輝度ムラとして認識 され、問題となる。また、隔壁で囲まれた領域内に十分 にインクが拡散しなかった場合には、発光層と隔壁との 境界部分で十分な発光輝度が得られないという問題を生 じる。尚、以下の記述においては、便宜上、エレクトロ ルミネッセンス素子を製造する場合においても、隣接す る発光層間でのインクの混じり合いを「混色」、発光層 と隔壁の境界部でのインクの反発による発光輝度ムラの 発生を「白抜け」と記す。

【0028】本発明の課題は、カラーフィルタやエレク

8

トロルミネッセンス素子といった光学素子を、インクジェット方式を利用して簡易なプロセスで安価に製造するに際して、上記問題を解決し、信頼性の高い光学素子を歩留まり良く提供することにある。具体的には、隔壁で囲まれた領域内にインクを付与する際に、隣接する画素間での混色を防止し、且つ、該領域内でインクを十分に拡散させて白抜けのない画素を形成することにある。本発明ではさらに、該製造方法によって得られた光学素子を用いて、カラー表示特性に優れた液晶素子をより安価

[0029]

に提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明の第一は、支持基板上に複数の画素と隣接する画素間に位置する樹脂組成物からなる隔壁とを少なくとも有する光学素子の製造方法であって、支持基板上の隔壁で囲まれる領域にポジ型レジストパターンを形成する工程と、上記レジストパターンを覆って支持基板全面に樹脂組成物層を形成する工程と、上記樹脂組成物層表面にフッ素化処理を施す工程と、上記レジストパターン上の樹脂組成物層を該レジストパターンごと除去して隔壁を形成する工程と、インクジェット方式により上記隔壁で囲まれた領域にインクを付与して画素を形成する工程と、を有することを特徴とする光学素子の製造方法である。

【0030】上記本発明は、上記フッ素化処理が、少なくともフッ素原子を含有するガスを導入してプラズマ照射を行うプラズマ処理であること、上記隔壁を、遮光剤を含有する樹脂組成物で形成すること、該遮光剤がカーボンプラックであること、上記ポジ型レジストパターン形成工程よりも前に、支持基板表面に親インク化処理を施すこと、該親インク化処理が、アルカリ水溶液による洗浄処理、UV洗浄処理、エキシマ洗浄処理、コロナ放電処理、酸素プラズマ処理のいずれかであること、上記インクが少なくとも硬化成分、水、有機溶剤を含有すること、上記インクが着色剤を含有し、画素が着色部であるカラーフィルタを製造すること、上記画素が発光層であるエレクトロルミネッセンス素子を製造すること、を好ましい競様として含むものである。

【0031】また本発明の第二は、支持基板上に複数の画素と隣接する画素間に位置する隔壁とを少なくとも有し、上記本発明の光学素子の製造方法により製造された 40 ことを特徴とする光学素子である。

【0032】上記本発明の第二は、上記隔壁が遮光層であること、上記支持基板が透明基板であり、上記画素が着色剤を含有するインクで形成された着色部であり、複数色の着色部を備えたカラーフィルタであること、上記着色部上に保護層を有すること、表面に透明導電膜を有すること、上記画素が発光層であり、該発光層を挟んで上下に電極を有するエレクトロルミネッセンス素子であること、を好ましい態様として含むものである。

【0033】さらに本発明の第三は、一対の基板間に液 50 ーフィルタの着色部103が形成され、その上に透明な

晶を挟持してなり、一方の基板が上記本発明の光学素子の一態様であるカラーフィルタを用いて構成されたことを特徴とする液晶素子である。

[0034]

【発明の実施の形態】本発明の光学素子の製造方法は、 支持基板上に隔壁を形成する工程において、支持基板上 にポジ型レジストパターンを形成し、その上に隔壁を形 成する樹脂組成物層を形成し、フッ素化処理を施して該 樹脂組成物層表面の撥インク性を増大させた後、リフト オフによって、上記レジストパターン上の樹脂組成物層 をレジストパターンごと除去して隔壁を形成し、インク ジェット方式によりインクを付与して画素を形成するこ とに特徴を有する。そのため本発明においては、インク を付与した際に、隔壁上面の撥インク性によって、多量 のインクでも十分に保持して混色を防止する一方、隔壁 側面及び支持基板表面は親インク性が高く、速やかにイ ンクが濡れ広がり、白抜けが防止される。

【0035】尚、本発明において上記「インク」とは、 乾燥硬化した後に、例えば光学的、電気的に機能性を有 する液体を総称し、従来用いられていた着色材料に限定 されるものではない。

【0036】本発明の製造方法で製造される本発明の光学素子としては、カラーフィルタ及びエレクトロルミネッセンス素子が挙げられる。先ず、本発明の光学素子について実施形態を挙げて説明する。

[0037] 図8に、本発明の光学素子の一実施形態であるカラーフィルタの一例の断面を模式的に示す。図中、101は支持基板としての透明基板、102は隔壁を兼ねたブラックマトリクス、103は画素である着色部、104は必要に応じて形成される保護層である。本発明のカラーフィルタを用いて液晶素子を構成する場合には、着色部103上に保護層104を形成したさらにその上に、液晶を駆動するためのITO(インジウム・チン・オキサイド)等透明導電材からなる透明導電膜が形成されて提供される場合もある。

【0038】図9に、図8のカラーフィルタを用いて構成された、本発明の液晶素子の一実施形態の断面模式図を示す。図中、107は共通電極(透明導電膜)、108は配向膜、109は液晶、111は対向基板、112は画素電極、113は配向膜であり、図8と同じ部材には同じ符号を付して説明を省略する。

【0039】カラー液晶素子は、一般的にカラーフィルタ側の基板101と対向基板111とを合わせ込み、液晶109を封入することにより形成される。液晶素子の一方の基板111の内側に、TFT(不図示)と画素電極112がマトリクス状に形成されている。また、カラーフィルタ側の基板101の内側には、画素電極112に対向する位置に、R、G、Bが配列するように、カラースイルタの差の第102が形成され、その上に添照なる。

共通電極107が形成される。さらに、両基板の面内に は配向膜108、113が形成されており、液晶分子を 一定方向に配列させている。これらの基板は、スペーサ ー(不図示)を介して対向配置され、シール材(不図 示)によって貼り合わされ、その間隙に液晶109が充 填される。

【0040】上記液晶素子は、透過型の場合には、基板 111及び画素電極112を透明素材で形成し、それぞ れの基板の外側に偏光板を接着し、一般的に蛍光灯と散 乱板を組み合わせたバックライトを用い、液晶化合物を 10 バックライトの光の透過率を変化させる光シャッターと して機能させることにより表示を行う。また、反射型の 場合には、基板111或いは画素電極112を反射機能 を備えた素材で形成するか、或いは、基板111上に反 射層を設け、透明基板101の外側に偏光板を設け、カ ラーフィルタ側から入射した光を反射して表示を行う。

【0041】また、図7に、本発明の光学素子の他の実 施形態である、有機エレクトロルミネッセンス素子(以 下、「EL素子」と記す)の一例の断面模式図を示す。 図中、91は支持基板である駆動基板、92は隔壁、9 3は画素である発光層、94は透明電極、96は金属層 である。この図では、簡略化のために一つの画素領域の みを示している。

【0042】駆動基板91には、TFT(不図示)、配 線膜及び絶縁膜等が多層に積層されており、金属層96 及び発光層93毎に配置した透明電極94間に発光層単 位で電圧を印加可能に構成されている。駆動基板91は 公知の薄膜プロセスによって製造される。

【0043】本発明の有機EL素子の構造については、 少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極及 30 子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合体であっ び陰極からなる電極間に、樹脂組成物からなる隔壁内に 少なくとも発光材料を充填されてなる構成であれば、特 に制限はなく、その構造は公知のものを採用することが でき、また本発明の主旨を逸脱しない限りにおいて各種 の改変を加えることができる。

【0044】その積層構造は、例えば、

- (1)電極(陰極)/発光層/正孔注入層/電極(陽 極)
- (2) 電極(陽極) /発光層/電子注入層/電極(陰 極)
- (3)電極(陽極)/正孔注入層/発光層/電子注入層 /電極(陰極)
- (4) 電極 (陽極または陰極) /発光層/電極 (陰極ま たは陽極)

があるが、本発明は上記のいずれの構成の有機化合物層 を設けた積層構造体を有するEL素子に対しても適用す ることができる。

【0045】上記(1)は2層構造、(3)は3層構造 (4) は単層構成と称されるものである。本発明の有機 EL素子はこれらの積層構造を基本とするが、これら以 50

外の(1)から(4)を組み合わせた構造やそれぞれの 層を複数有していてもよい。また、カラーフィルタと組 み合わせることによって、フルカラー表示を実現しても 良い。これらの積層構造からなる本発明の有機EL素子 の形状、大きさ、材質、製造方法等は該有機EL素子の 用途等に応じて適宜選択され、これらについては特に制 限はない。

【0046】本発明の有機EL素子の発光層に用いられ る発光材料は特に限定されず、種々のものを適用するこ とができる。具体的には、低分子蛍光体や高分子蛍光体 が好ましく、髙分子蛍光体がさらに好ましい。

【0047】例えば、低分子有機化合物としては、特に 限定はないが、ナフタレン及びその誘導体、アントラセ ン及びその誘導体、ペリレン及びその誘導体、ポリメチ ン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系などの色 素類、8-ヒドロキシキノリン及びその誘導体の金属錯 体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエン 及びその誘導体、テトラフェニルプタジエン及びその誘 導体等を用いることができる。具体的には、例えば、特 開昭57-51781号、特開昭59-194393号 公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能で ある。

【0048】また、発光材料として使用可能な高分子有 機化合物としては、特に限定はないが、ポリフェニレン ピニレン、ポリアリレン、ポリアルキルチオフェン、ポ リアルキルフルオレン等を挙げることができる。

【0049】尚、本発明の有機EL素子に用いる高分子 蛍光体は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体 であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分 てもよい。蛍光の量子収率の高い高分子蛍光体を得る観 点からは完全なランダム共重合体よりプロック性を帯び たランダム共重合体やプロックまたはグラフト共重合体 が好ましい。また本発明の有機EL素子は、薄膜からの 発光を利用するので該高分子蛍光体は、固体状態で蛍光 を有するものが用いられる。

【0050】該高分子蛍光体に対する良溶媒としては、 クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラ ヒドロフラン、トルエン、キシレンなどが例示される。 40 高分子蛍光体の構造や分子量にもよるが、通常はこれら の溶媒に 0. 1重量%以上溶解させることができる。

【0051】本発明の有機EL素子において、発光材料 を含む層と陰極との間にさらに電子輸送層を設ける場合 の電子輸送層中に使用する、或いは正孔輸送材料及び発 光材料と混合使用する電子輸送性材料は、陰極より注入 された電子を発光材料に伝達する機能を有している。こ のような電子輸送性材料について特に制限はなく、従来 公知の化合物の中から任意のものを選択して用いること ができる。

【0052】該電子輸送性材料の好ましい例としては、

ニトロ置換フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン 誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシ ド誘導体、複素環テトラカルポン酸無水物、或いはカル ボジイミド等を挙げることができる。

【0053】さらに、フレオレニリデンメタン誘導体、・ アントラキノジメタン誘導体及びアントロン誘導体、オ キサジアゾール誘導体等を挙げることができる。また、 発光層を形成する材料として開示されているが、8-ヒ ドロキシキノリン及びその誘導体の金属錯体等も電子輸 送材料として用いることができる。

【0054】次に、本発明の一例である積層構造を有す る有機EL素子の代表的な作製方法について述べる。陽 極及び陰極からなる一対の電極で、透明または半透明な 電極としては、例えば、透明ガラス、透明プラスチック 等の透明基板の上に、透明または半透明の電極を形成し たものが用いられる。

【0055】本発明のEL素子において、発光層は一般 には適当な結着性樹脂と組み合わせて薄膜を形成する。 上記結着剤としては広範囲な結着性樹脂より選択でき、 例えばポリビニルカルバゾール樹脂、ポリカーボネート 20 樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアリレート樹脂、プチラ ール樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリピニルアセタール樹 脂、ジアリルフタレート樹脂、アクリル樹脂、メタクリ ル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹 脂、ポリスルホン樹脂、尿素樹脂等が挙げられるが、こ れらに限定されるものではない。これらは単独または共 重合体ポリマーとして1種または2種以上混合して用い ても良い。陽極材料としては仕事関数がなるべく大きな ものが良く、例えば、ニッケル、金、白金、パラジウ ム、セレン、レニウム、イリジウムやこれらの合金、或 30 いは酸化錫、酸化錫インジウム(ITO)、ヨウ化銅が 好ましい。またポリ(3-メチルチオフェン)、ポリフ ェニレンスルフィド或いはポリピロール等の導電性ポリ マーも使用出来る。

【0056】一方、陰極材料としては仕事関数が小さな 銀、鉛、錫、マグネシウム、アルミニウム、カルシウ ム、マンガン、インジウム、クロム或いはこれらの合金 が用いられる。

【0057】以下に、図面を参照して本発明の光学素子 の製造方法について説明する。

【0058】図1、図2は本発明の光学素子の製造方法 を模式的に示す工程図である。以下に各工程について説 明する。尚、以下の工程(a)~(h)は図1、図2の (a)~(h)に対応する。また、図1、図2の各工程 において紙面左側の(a-1)~(h-1) は基板の平 面模式図、紙面右側の (a-2)~ (h-2)は (a-1)~(h-1)のA-B断面模式図である。図中、1 は支持基板、2はポジ型レジスト層、3はレジストパタ ーン、4は樹脂組成物層、5は隔壁、6は隔壁5に囲ま れた領域(開口部)、7はインクジェットヘッド、8は 50 脂組成物を用いる。該遮光剤としては、高い遮光性が得

インク、9は画素である。

【0059】工程(a)

支持基板1を用意する。支持基板1は、図8に例示した カラーフィルタを製造する場合には透明基板101であ り、一般にはガラス基板が用いられるが、液晶素子を構 成する目的においては、所望の透明性、機械的強度等の 必要特性を有するものであれば、プラスチック基板など も用いることができる。

【0060】また、図7に例示したEL素子を製造する 10 場合には、支持基板1は透明電極94を形成した駆動基 板91であり、図7の如く当該基板側から発光を観察す る場合には、駆動基板91にガラス基板などの透明基板 を用いる。

【0061】支持基板1には、後述する工程(g)にお いてインクが濡れ広がりやすいように、予め親インク化 処理を施しておくことが望ましい。親インク化処理とし ては、例えばアルカリ水溶液による洗浄処理、UV洗浄 処理、エキシマ洗浄処理、コロナ放電処理、酸素プラズ マ処理等の方法が好適に用いられる。

【0062】工程(b)

支持基板1上に、ポジ型レジスト層2を形成する。

【0063】 工程(c)

ポジ型レジスト層2をパターニングし、レジストパター ン3を形成する。レジストパターン3は最終的に除去さ れ、その際、上層に形成された樹脂組成物層4をリフト オフして所定のパターンの樹脂組成物層を残して隔壁5 を形成する。また、後述するフッ素化処理において隔壁 5の側面となる領域及び支持基板1表面を保護するため の部材でもある。よって、レジストパターン3のパター ンは隔壁5とは逆のパターンとなるように形成される。 尚、当該レジストとしては、フッ素化処理後に除去しう る材料を用いる必要がある。特に、アルカリ可溶のポジ 型レジストを用いた場合、該レジスト除去時のアルカリ 洗浄によって、支持基板1表面を親インク化処理できる ため、インク付与時の濡れ性が高くなり、白抜け防止効 果がより高まり、好ましい。

【0064】工程(d)

支持基板1上に全面に隔壁5の素材である樹脂組成物層 4をレジストパターン4を覆って形成する。本発明にお いて、隔壁5を形成するために用いられる樹脂組成物と しては、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアミド イミドを含むポリイミド系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリ エステル系樹脂、ポリビニル系樹脂などの感光性または 非感光性の樹脂材料を用いることができるが、250℃ 以上の耐熱性を有することが好ましく、その点から、エ ポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂が好 ましく用いられる。

【0065】また、かかる隔壁5を遮光層とする場合に は、上記樹脂組成物中に、遮光剤を分散せしめた黒色樹

られることから、カーボンブラックを用いることが望ましく、該カーボンブラックとしては、チャネルブラック、ローラーブラック、ディスクブラックと呼ばれているコンタクト法で製造されたもの、ガスファーネストプラック、オイルファーネストブラックと呼ばれているサーマル法で製造されたもの、サーマルブラック、アセチレンブラックと呼ばれているサーマル法で製造されたものなどを用いることができるが、特に、チャネルブラック、ガスファーネストブラック、オイルファーネストブラックが好ましい。さらに必要に応じて、R、G、Bの顔料の混合物などを加えても良い。また、一般に市販されている黒色レジストを用いることもできる。必要に応じて髙抵抗化した遮光層を用いても良い。

【0066】樹脂組成物層4は、スピンコート、ロールコート、バーコート、スプレーコート、ディップコート、或いは印刷法等の方法により形成することができる。

【0067】工程(e)

樹脂組成物層4表面にフッ素化処理を施し、該表面の撥インク性を増大させる。当該フッ素化処理としては、エ 20程が簡単であり樹脂組成物層4表面を良好にフッ素化して撥インク性を増大させることができる方法として、少なくともフッ素原子を含有するガスを導入してプラズマ 照射を行うプラズマ処理が好ましく用いられる。

【0069】さらに、導入ガスとしては、必要に応じて酸素、アルゴン、ヘリウム等のガスを併用しても良い。本工程においては、上記CF、、CHF、、C,F。、SF、、C,F。、C,F。から選択されるハロゲンガスを1種以上とO」との混合ガスを用いると、本工程においてフッ素化処理される樹脂組成物層4表面の撥インク性の程度を制御することが可能になる。但し、当該混合ガスにおいて、O」の混合比率が30%を超えるとO」による酸化反応が支配的になり、撥インク性向上効果が妨げられるため、また、O」混合比率が30%を超えると樹脂に対するダメージが顕著になるため、当該混合ガスを用いる場合にはO」の混合比率が30%以下の範囲で使用する必要がある。

【0070】また、プラズマの発生方法としては、低周 50 い。以下に、本発明の製造方法によってカラーフィルタ

波放電、高周波放電、マイクロ波放電等の方式を用いる ことができ、プラズマ処理の際の圧力、ガス流量、放電 周波数、処理時間等の条件は任意に設定することができ る。

【0071】図5、図6に、上記プラズマ処理工程に用いることが可能なプラズマ発生装置の模式図を示す。図中、51は上部電極、52は下部電極、53は被処理基板、54は高周波電極である。当該装置は平行平板の2極電極に高周波電圧を印加して、プラズマを発生させる。図5はカソードカップリング方式、図6はアノードカップリング方式の装置を示し、どちらの方式においても、圧力、ガス流量、放電周波数、処理時間等の条件によって、樹脂組成物層4表面の撥インク性を所望の程度とすることができる。

【0072】図5、図6に示したプラズマ発生装置において、図5のカソードカップリング方式は処理時間を短くすることが可能であり、当該処理工程に有利である。また、図6のアノードカップリング方式では、必要以上に支持基板1にダメージを与えることがない点で有利である。よって、本工程に用いるプラズマ発生装置は、支持基板1や樹脂組成物層4の材料に応じて選択すればよい

【0073】工程(f)

リフトオフ工程により、レジストパターン3上の樹脂組成物層4を、レジストパターン3ごと除去し、必要に応じて残された樹脂組成物層4を熱硬化して、隔壁5を形成する。

【0074】レジストパターン3の除去方法としては、 用いられるレジストの材質に応じて異なるが、隔壁5の 密着性、フッ素化処理された隔壁5上面の撥インク性に 悪影響を与えない方法を用いる必要がある。例えば、ア ルカリ水溶液や有機溶剤により溶解する方法や、それに 加えて紫外線エネルギー照射を併用する方法がある。

【0075】これらの一連の工程により、隔壁5上面の みが撥インク性を有し、隔壁5で囲まれた領域に露出し た支持基板1表面及び隔壁5の側面が親インク性を有す るマトリクスパターン基板が得られる。

【0076】工程(g)

インクジェット記録装置を用いて、インクジェットへッド7より、インク8を隔壁5で囲まれた領域(開口部6)に付与する。インクジェットとしては、エネルギー発生素子として電気熱変換体を用いたパブルジェット(登録商標)タイプ、或いは圧電素子を用いたピエゾジェットタイプ等が使用可能である。また、インク8としては、カラーフィルタの場合には硬化後にR、G、Bの着色部を形成するように各色の着色剤を含むもの、EL素子の場合には、硬化後に電圧印加によって発光する発光層を形成する材料を用いる。いずれの場合も、インク8は硬化成分、水、溶剤を少なくとも含むものが好ましい。以下に、大祭門の制造されてよってカラーフィルの

を製造する場合に用いるインクの組成についてさらに詳 細に説明する。

【0077】〔1〕着色剤

本発明でインク中に含有させる着色剤としては、染料系 及び顔料系共に使用可能であるが、顔料を使用する場合 には、インク中で均一に分散させるために別途分散剤の 添加が必要となり、全固形分中の着色剤比率が低くなっ てしまうことから、染料系の着色剤が好ましく用いられ る。また、着色剤の添加量としては、後述する硬化成分 と同量以下であることが好ましい。

【0078】〔2〕硬化成分

後工程におけるプロセス耐性、信頼性等を考慮した場 合、熱処理或いは光照射等の処理により硬化し、着色剤 を固定化する成分、即ち架橋可能なモノマー或いはポリ マー等の成分を含有することが好ましい。特に、後工程 における耐熱性を考慮した場合、硬化可能な樹脂組成物 を用いることが好ましい。具体的には、例えば基材樹脂 として、水酸基、カルボキシル基、アルコキシ基、アミ ド基等の官能基を有するアクリル樹脂、シリコーン樹 脂;またはヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシ 20 エチルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチ ルセルロース等のセルロース誘導体或いはそれらの変性 物;またはポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコー ル、ポリビニルアセタール等のビニル系ポリマーが挙げ られる。さらに、これらの基材樹脂を光照射或いは加熱 処理により硬化させるための架橋剤、光開始剤を用いる ことが可能である。具体的には、架橋剤としては、メチ ロール化メラミン等のメラミン誘導体が、また光開始剤 としては重クロム酸塩、ビスアジド化合物、ラジカル系 開始剤、カチオン系開始剤、アニオン系開始剤等が使用 30 可能である。また、これらの光開始剤を複数種混合し て、或いは他の増感剤と組み合わせて使用することもで きる。

【0079】〔3〕溶剤

本発明で使用されるインクの媒体としては、水及び有機 溶剤の混合溶媒が好ましく使用される。水としては種々 のイオンを含有する一般の水ではなく、イオン交換水 (脱イオン水)を使用することが好ましい。

【0080】有機溶剤としては、メチルアルコール、エ チルアルコール、n-プロピルアルコール、イソプロピ 40 ルアルコール、n-プチルアルコール、sec-プチル アルコール、tertープチルアルコール等の炭素数1 ~4のアルキルアルコール類;ジメチルホルムアミド、 ジメチルアセトアミド等のアミド類:アセトン、ジアセ トンアルコール等のケトン類またはケトアルコール類; テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;ポリ エチレングリコール、ポリプロピレングリコール等のポ リアルキレングリコール類; エチレングリコール、プロ ピレングリコール、プチレングリコール、トリエチレン グリコール、チオジグリコール、ヘキシレングリコー

16

ル、ジエチレングリコール等のアルキレン基が2~4個 の炭素を含有するアルキレングリコール類:グリセリン 類:エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレ ングリコールメチルエーテル、トリエチレングリコール

モノメチルエーテル等の多価アルコールの低級アルキル エーテル類: N-メチル-2-ピロリドン、2-ピロリ ドン等の中から選択することが好ましい。

【0081】また、上記成分の他に、必要に応じて所望 の物性値を持つインクとするために、沸点の異なる2種 10 類以上の有機溶剤を混合して用いたり、界面活性剤、消 泡剤、防腐剤等を添加しても良い。

【0082】工程(h)

熱処理、光照射等必要な処理を施し、インク8中の溶剤 成分を除去して硬化させることにより、画素9を形成す

【0083】さらに、カラーフィルタの場合には、前記 したように、必要に応じて保護層や透明導電膜を形成す る。この場合の保護層としては、光硬化タイプ、熱硬化 タイプ、或いは光熱併用硬化タイプの樹脂材料、或い は、蒸着、スパッタ等によって形成された無機膜等を用 いることができ、カラーフィルタとした場合の透明性を 有し、その後の透明導電膜形成プロセス、配向膜形成プ ロセス等に耐えうるものであれば使用可能である。ま た、透明導電膜は、保護層を介さずに着色部上に直接形 成しても良い。また、EL素子の場合には、画素上に金 属層等必要な部材を形成する。

[0084]

【実施例】 (実施例1)

〔レジストパターンの形成〕ガラス基板(コーニング製 「1737」)をUV洗浄処理し、ポジ型フォトレジス ト(東京応化製「OFPRレジスト」)を膜厚が1.5 μmとなるように塗布し、所定の露光、現像、ペーク処 理を行って、 $75\mu m \times 225\mu m$ の長方形のレジスト が縦横に複数個配列されたレジストパターンを得た。

【0085】〔樹脂組成物層の形成〕次いで、上記レジ ストパターンの形成されたガラス基板上に、ブラックマ トリクス用黒鉛塗料 (日立粉末冶金製) を膜厚が 2 μ m となるように塗布した。

〔フッ素化処理〕上記樹脂組成物層として黒鉛塗料層を 形成したガラス基板に、平行平板型のプラズマ処理装置 を用いて、以下の条件にてプラズマ処理を施した。

[0086]

使用ガス : CF.

ガス流量 :80sccm

圧力 : 8 P a RFパワー : 150W 処理時間 :60sec

【0087】 〔樹脂組成物層のリフトオフ〕上記プラズ マ処理を施したガラス基板を裏面から全面露光した後、 50 アルカリ水溶液(東京応化製「NMD現像液」)に浸漬

した後、高圧スプレーにて純水を吹き付けることによ り、レジストパターン上の黒鉛塗料をレジストパターン ごと除去し、200℃で30分間の熱処理を行って、膜 厚2μm、75μm×225μmの長方形の開口部を有 するプラックマトリクスパターンを形成した。

【0088】〔撥インク性の評価〕上記プラックマトリ クスを形成した基板(プラックマトリクス基板)の純水 に対する接触角を測定したところ、

プラックマトリクス上面:130°

ガラス基板表面:20°

であった。

【0089】〔インクの調整〕下記に示す組成からなる アクリル系共重合体を熱硬化成分として用い、以下の組 成にてR、G、Bの各インクを調製した。

50重量部

6重量部

【0090】硬化成分 メチルメタクリレート

ヒドロキシエチルメタクリレート 30重量部 N-メチロールアクリルアミド 20重量部 【0091】Rインク C. I. アシッドオレンジ148 3. 5重量部 C. I. アシッドレッド289 0.5重量部 ジエチレングリコール 30重量部 エチレングリコール 20重量部 イオン交換水 40重量部 上記硬化成分 6 重量部 【0092】Gインク C. I. アシッドイエロー23 2重量部 亜鉛フタロシアニンスルホアミド 2重量部 30重量部 ジエチレングリコール エチレングリコール 20重量部 40重量部 イオン交換水

【0093】Bインク

上記硬化成分

C. I. ダイレクトプルー199 4重量部 ジエチレングリコール 30重量部 エチレングリコール 20重量部 イオン交換水 40重量部 上記硬化成分 6 重量部

【0094】〔着色部の作製〕吐出量20plのインク ジェットヘッドを具備したインクジェット記録装置を用 40 T駆動基板上に画素(発光層)単位に、透明電極として い、上記ブラックマトリクス基板に対して、上記R、 G、Bインクを開口部1個あたり200~800plの 範囲で100plおきに量を変化させて付与した。次い で、90℃で10分間、引き続き230℃で30分間の 熱処理を行ってインクを硬化させて着色部(画素)と し、インク付与量の異なる7種類のカラーフィルタを作 製した。

【0095】〔混色及び白抜けの評価〕得られたカラー フィルタを光学顕微鏡で観察したところ、全てのカラー フィルタにおいて、混色、白抜けは観察されなかった。

【0096】 (実施例2) ガラス基板に酸素プラズマ処 理を施した後、ポジ型フォトレジストを塗布し、フッ素 化処理における使用ガスをCF,ガスからC,F,に代え た以外は実施例1と同様にしてカラーフィルタを作製し

【0097】〔撥インク性の評価〕プラックマトリクス 基板の純水に対する接触角を測定したところ、

プラックマトリクス上面:130°

ガラス基板表面:10°

10 であった。

【0098】 〔混色及び白抜けの評価〕得られたカラー フィルタを光学顕微鏡で観察したところ、全てのカラー フィルタにおいて、混色、白抜けは観察されなかった。 【0099】 (比較例1) フッ素化処理を行わない以外 は実施例1と同様にしてカラーフィルタを作製した。

【0100】〔撥インク性の評価〕プラックマトリクス 基板の純水に対する接触角を測定したところ、

プラックマトリクス上面:70°

ガラス基板表面:20°

20 であった。

【0101】 (混色及び白抜けの評価) 得られたカラー フィルタを光学顕微鏡で観察したところ、インクの付与 量が400p1以上のカラーフィルタにおいて、混色が 観察された。白抜けは観察されなかった。

【0102】(比較例2)ガラス基板のUV洗浄を行わ ず、フッ素化処理も行わない以外は実施例1と同様にし てカラーフィルタを作製した。

【0103】〔撥インク性の評価〕プラックマトリクス 基板の純水に対する接触角を測定したところ、

30 プラックマトリクス上面:70°

ガラス基板表面:60°

であった。

【0104】 (混色及び白抜けの評価) 得られたカラー フィルタを光学顕微鏡で観察したところ、全てのカラー フィルタにおいて白抜けが観察された。また、インクの 付与量が400p1以上のカラーフィルタにおいて、混 色が観察された。

【0105】(実施例3)薄膜プロセスによって形成さ れた、配線膜及び絶縁膜等が多層に積層されてなるTF ITOをスパッタリングにより40nmになるように形 成し、フォトリソ法により、画素形状に従ってパターニ ングを行った。

【0106】次に発光層を充填する隔壁を形成した。実 施例1と同様にして上記TFT基板をUV洗浄処理した 後、膜厚が1.0μmとなるようポジ型フォトレジスト を塗布し、所定の露光、現像、ペーク処理を行って、7 $5 \mu m \times 225 \mu m のレジストパターンを形成した。次$ いで、透明感光性樹脂(富士フイルムオーリン製「CT 50 -2000L」) を膜厚0. 5 μmとなるよう塗布しプ

リベークした後、実施例 1 と同様のフッ素化処理、リフトオフ処理、及び 2 0 0 \mathbb{C} で 3 0 分間の熱処理を行って、上記の 1 T 〇透明電極上に膜厚 0 . 5 μ m \times 2 2 5 μ m の長方形の開口部を有する透明なマトリクスパターンを作成した。 1 T 〇透明電極上と透明マトリクスパターン上それぞれの純水に対する接触角は、

【0107】次に前記基板の隔壁内に発光層を充填し

ITO透明電極上:17°

透明マトリクスパターン上:105° であった。

た。発光層としては、電子輸送性 2 , 5 ー ビス (5 ー t e r t ー プチルー 2 ー ベンゾオキサゾルイル) ーチオフェン [蛍光ピーク 4 5 0 n mをもつ電子輸送性青色発光色素であり、発光中心形成化合物の1つである。以下、「BBOT」と記す) 3 0 重量%を、ポリーNーピニルカルバゾール [分子量 1 5 0 , 0 0 0 0 、関東化学社製、以下、「PVK」と記す] よりなるホール輸送性ホスト化合物中に分子分散させることができるよう、両者をジクロロエタン溶液に溶解させた。該PVKーBBOTのジクロロエタン溶液にさらに、もう1つの発光中心形成 20 化合物であるナイルレッドを 0 . 0 1 5 モル%となるよ

うに溶解し、該溶液をインクとして、インクジェット法

により透明樹脂で囲まれた開口部内に充填、乾燥し、厚

さ200nmの発光層を形成した。このとき、各画素

(発光層) は独立し、隔壁間で前記発光材料を含む溶液が隣接画素で混ざることはなかった。さらにこの上に、Mg:Ag(10:1)を真空蒸着させて厚さ200nmのMg:Ag陰極を形成した。このようにして作製したEL素子の各画素に<math>18Vの電圧を印加したところ、 $480cd/m^{1}$ の均一な白色発光が得られた。

[0108]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 混色や白抜けのない画素を備えた信頼性の高い光学素子 をインクジェット方式により簡易なプロセスによって歩 留まり良く製造することができ、着色部内で濃度ムラの ないカラーフィルタ、発光層内で発光輝度ムラのないE し素子を歩留まり良く提供することができる。よって、 上記カラーフィルタを用いて、カラー表示特性に優れた 液晶素子をより安価に提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光学素子の製造方法の一実施形態の工程図である。

【図2】本発明の光学素子の製造方法の一実施形態の工程図である。

【図3】インクジェット方式による光学素子の製造方法において発生する混色の概念図である。

【図4】インクジェット方式による光学素子の製造方法 において発生する白抜けの概念図である。

【図5】本発明の製造方法において用いうるプラズマ発生装置の構成の一例を示す模式図である。

【図6】本発明の製造方法において用いうるプラズマ発生装置の他の構成を示す模式図である。

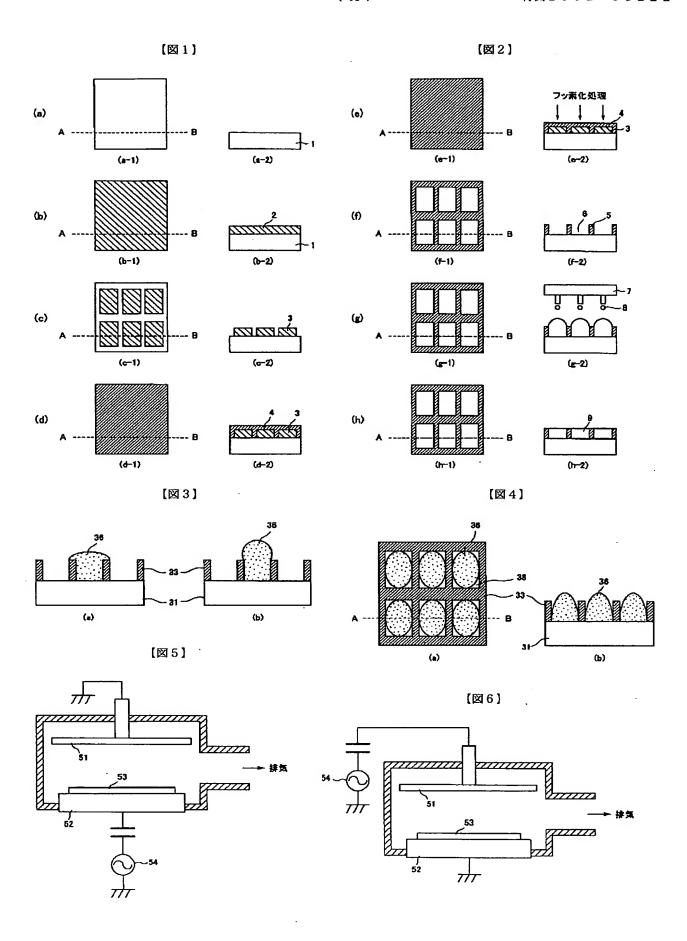
【図7】本発明の光学素子の一実施形態であるエレクトロルミネッセンス素子の一例の断面模式図である。

【図8】本発明の光学素子の他の実施形態であるカラー 10 フィルタの一例の断面模式図である。

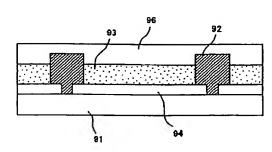
【図9】本発明の液晶素子の一実施形態の断面模式図である。

【符号の説明】

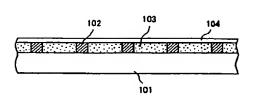
- 1 支持基板
- 2 ポジ型レジスト層
- 3 レジストパターン
- 4 樹脂組成物層
- 5 隔壁
- 6 開口部
- 20 7 インクジェットヘッド
 - 8 インク
 - 9 画素
 - 31 透明基板
 - 33 プラックマトリクス
 - 36 インク
 - 38 白抜け
 - 51 上部電極
 - 52 下部電極
 - 53 被処理基板
- 30 54 髙周波電極
 - 91 駆動基板
 - 92 隔壁
 - 9 3 発光層
 - 94 透明電極
 - 96 金属層
 - 101 透明基板
 - 102 プラックマトリクス
 - 103 着色部
 - 104 保護層
- 40 107 共通電極
 - 108 配向膜
 - 109 液晶
 - 111 対向基板
 - 112 画素電極
 - 113 配向膜



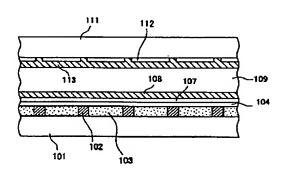
[図7]



【図8】



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 岡田 健 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72)発明者 谷内 洋 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72)発明者 西田 武人 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72)発明者 坂本 淳一 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 岩田 研逸 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72)発明者 岡田 良克 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

Fターム(参考) 2C056 EA24 FA03 FA04 FB01

2H048 BA02 BA11 BA28 BA29 BA64 BB02 BB14 BB22 BB37 BB44

2H091 FA03Y FA35Y FB02 FC10 FC23 GA13 LA15 LA30 MA10 2H096 AA00 AA27 AA28 BA09 EA00

GA00 HA30 JA04 LA02